

สัญญาเลขที่ R2562B054

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลของอุณหภูมิขั้นเต็อร์ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้า
ของเซรามิก $\text{KNLNTS} + 0.3\text{wt\%Bi}_2\text{O}_3 + 0.4\text{wt\%Fe}_2\text{O}_3 + 0.2\text{wt\%CuO}$ ที่เตรียมด้วย
เทคนิคการเผาใหม่

Effect of sintering temperature on crystal structure, microstructure
and electrical properties of

$\text{KNLNTS} + 0.3\text{wt\%Bi}_2\text{O}_3 + 0.4\text{wt\%Fe}_2\text{O}_3 + 0.2\text{wt\%CuO}$ ceramics prepared via
combustion technique



ดร.จารุ จิตมูลิก
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน.....
เลขทะเบียน..... 1046530
เลขเรียกหนังสือ..... ๑๒๔

๕
๗๓๒๑๖
๒๕๖๒

สนับสนุนโดยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีงบประมาณ 2562

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีงบประมาณ 2562 ผู้วิจัยและคณบดีของขบวนคุณ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านที่
อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ขอขอบคุณ Science Lab Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

ดร. Jarvis จุติมูสิก และคณบดี



หัวข้อวิจัย	ผลของอุณหภูมิชินเตอร์ที่ต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNLNTS +0.3wt%Bi ₂ O ₃ +0.4wt%Fe ₂ O ₃ +0.2wt%CuO ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาใหม่
นักวิจัย	ดร. Jarvis จุติมุสิก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ด้วยวิธีการเผาใหม่โดยใช้ไกลซีนเป็นเข็ือเพลิง ผงผลึกแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเซรามิกชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติภายในภาพและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO พบว่าเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO แสดงโครงสร้างเฟสแบบผสมระหว่างออร์โตรอมบิกและเทรอโนนัล ในทุกตัวอย่าง เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น ร้อยละของโครงสร้างออร์โตรอมบิกเพิ่มขึ้นในขณะที่ร้อยละของโครงสร้างเทรอโนนัลลดลง ซึ่งยืนยันได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง XRD โดยใช้โปรแกรม Full prof ขนาดกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น อัตราส่วนระหว่าง Amm2:P4bm ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1025°C มีค่าเท่ากับ 46.38:53.62 และเซรามิกแสดงค่าความหนาแน่นสูงสุด (4.70 g/cm^3) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง (ϵ at $T_r=1652$ และ ϵ at $T_m=6745$) สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกดี ($P_r=20.78 \mu\text{C/cm}^2$ และ $E_c=10.16 \text{ kV/cm}$) และค่าความเครียดสูง (0.274%)

Research Topic: Effect of Fe_2O_3 Doping on Phase Formation, Microstructure, Electric and Magnetic Properties of $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ Ceramics Synthesized by Combustion Method

Researcher: Dr. Jaru Jutimoosik

Abstract

In this study, the KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO ceramics were prepared via the solid state combustion method with glycine as a fuel. The powders were calcined at the temperature of 650°C for 2 h. The samples sintered at the temperature range of 1000-1100°C for 2 h. The effect of sintering temperature (1000°C-1100°C for 2 h) on phase formation, microstructure, physical and electric properties of the KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO was investigated. The sintered pellets exhibited a pure perovskite phase with the coexistence of orthorhombic (Amm2) and tetragonal (P4bm) phases in all samples. The percentage of Amm2 increased while the percentage of P4bm decreased with increase of sintered temperature which was confirmed by the Full prof program. The average grain sizes tended to increase with increasing sintering temperature. The Amm2:P4bm ratio was about 46.38:53.62 at a sintering temperature of 1025°C. The highest density (4.70 g/cm³), high dielectric constant (ϵ at $T_r=1652$ and ϵ at $T_m=6745$), good ferroelectric properties ($P_r=20.78 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ and $E_c=10.16 \text{kV}/\text{cm}$) and the highest strain (0.274%) were obtained from the sample sintered at 1025°C.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เซรามิกไโพ็อิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เลดเชอร์โคเนียมไททาเนต (PZT) เนื่องจากมีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี [1] อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิต การใช้งานและการกำจัด เกิดการระเหยของตะกั่วออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ [2] จึงมีนักวิจัยจำนวนมากสนใจศึกษาวัสดุไโพ็อิเล็กทริกที่ปราศจาก ตะกั่วมาใช้ทดแทน ซึ่งเซรามิกไโพ็อิเล็กทริกที่ปราศจากตะกั่ว $K_{0.5}Na_{0.5}NbO_3$ (KNN) เป็นตัวเลือกที่ ดีชนิดหนึ่งเนื่องจากมีอุณหภูมิคุรุสูง ($\sim 420^\circ\text{C}$) แต่อย่างไรก็ตามเซรามิก KNN นี้แสดงสัมประสิทธิ์ไฟฟ้า ไโพ็อิเล็กทริกและสภาพขั้วคงค้างต่ำ [3] การปรับปรุงสมบัติไโพ็อิเล็กทริกของเซรามิก KNN สามารถ ทำได้โดยการเจือสารบางชนิด เช่น LiTaO_3 [4], LiSbO_3 [5], LiNbO_3 [6], CaTiO_3 [7] และ SrTiO_3 [8] เป็นต้น

ในปี 2015 ไกรลาศ มาตรมูล และคณะ [9] เตรียมเซรามิก $(K_{0.44}Na_{0.52}\text{Li}_{0.04})(Nb_{0.84}\text{Ta}_{0.10}\text{Sb}_{0.06})\text{O}_3$ (KNLNTS) ด้วยวิธีการเผาใหม้ โดยผงผลึกแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบร่วมหาดีที่อุณหภูมิแคล ไชน์ 650 องศาเซลเซียส ผงผลึกแสดงโครงสร้างเฟสแบบเพอร์อฟส์ไกท์ที่บริสุทธิ์ ซึ่งสามารถลด อุณหภูมิการเผาลงได้ 200 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปฏิกรณ์สถานะของแข็ง และที่ อุณหภูมิชินเตอร์ 1100 องศาเซลเซียส เซรามิกแสดงสมบัติไโพ็อิเล็กทริกสูง (E_r at $T_c \sim 6114$) สมบัติ เพอร์อิเล็กทริกดี ($P_r \sim 33.54 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $E_c \sim 10.1 \text{kV}/\text{cm}$) และสมบัติไโพ็อิเล็กทริกสูง ($d_{33} \sim 203 \text{ pC/N}$) แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมเซรามิกตระกูล KNN ให้มีความบริสุทธิ์สูงและความหนาแน่นสูง เป็นไปได้ยากเนื่องจากการระเหยของ K^+ และ Na^+ ที่อุณหภูมิสูง [10] เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการศึกษา การแทนที่หรือเจือสารประกอบออกไซด์ เช่น คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO), เหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3), ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), บอรอนออกไซด์ (B_2O_3) และบิทเมสออกไซด์ (Bi_2O_3) เป็นต้น เข้าไปในเซรามิก KNN เพื่อ ลดอุณหภูมิชินเตอร์และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของเซรามิกให้ดีขึ้นได้ โดย Sang-Hoon Shin และ คณะ [11] เตรียมเซรามิก $(1-x)(\text{Na}_{0.52}\text{K}_{0.443}\text{Li}_{0.037})(\text{Nb}_{0.883}\text{Sb}_{0.08}\text{Ta}_{0.037})\text{O}_3-x(\text{Sr}_{0.95}\text{Ca}_{0.05})\text{TiO}_3$ ที่ ปริมาณ $x=0-0.025$ และเติม CuO , Fe_2O_3 และ Bi_2O_3 เข้าไปในระหว่างกระบวนการชินเตอร์ ด้วยวิธี ผสมออกไซด์ พบร่วมหาดีเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบผสมระหว่างอิโซโรมบิกและเทหะโนนัลในทุก ตัวอย่างและที่ปริมาณ $x=0.01$ เซรามิกมีค่าความหนาแน่นสูง ($4.49 \text{ g}/\text{cm}^3$) สมบัติไโพ็อิเล็กทริกสูง ($d_{33} \sim 310 \text{ pC/N}$) และเตรียมเซรามิกได้ที่อุณหภูมิต่ำ (1020°C) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเตรียมเซรามิก KNLNTS ที่เติม CuO , Fe_2O_3 และ Bi_2O_3 ปริมาณ 0.2, 0.4 และ 0.3wt% ตามลำดับ แล้วศึกษาผลของ อุณหภูมิชินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพและสมบัติไฟฟ้าของเซรามิกที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม้

1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา

เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิชินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกายภาพของเซรามิก $KNLNTS+0.3\text{wt\%}Bi_2O_3+0.4\text{wt\%}Fe_2O_3+0.2\text{wt\%}CuO$ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. เตรียมเชรามิก $(K_{0.44}Na_{0.52}Li_{0.04})(Nb_{0.84}Ta_{0.10}Sb_{0.06})O_3$ ($KNLNTS+0.3\text{wt\%}Bi_2O_3+0.4\text{wt\%}Fe_2O_3+0.2\text{wt\%}CuO$) ด้วยวิธีการเผาใหม่และใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิง โดยแคลไชน์ผงผลึกที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และชินเตอร์เซรามิกที่อุณหภูมิ 1025-1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. ศึกษาผลของอุณหภูมิชินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ เช่น ร้อยละการหดตัว ความหนาแน่น และ สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก $KNLNTS$
3. วิเคราะห์ผลที่ได้และสรุป

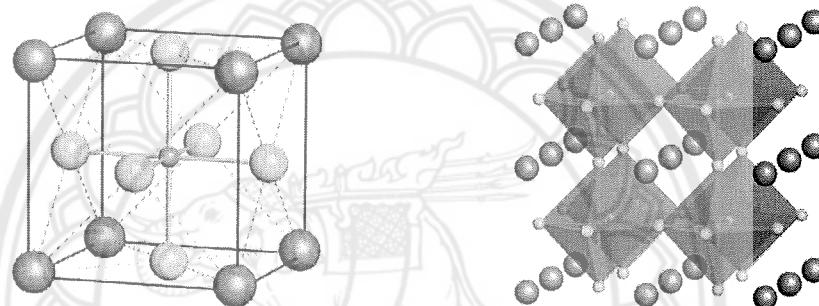
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้เข้าใจผลของอุณหภูมิชินเตอร์ที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกายภาพของเซรามิก $KNLNTS + 0.3\text{wt\%}Bi_2O_3+0.4\text{wt\%}Fe_2O_3+0.2\text{wt\%}CuO$ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่

บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างเพอร์อฟสไกต์ (perovskite structure)

โครงสร้างเพอร์อฟสไกต์มีสูตรทางเคมี คือ ABO_3 ประกอบด้วยอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดใหญ่กว่าตัวอยู่ที่ตำแหน่ง A (A-site) ซึ่งอยู่ที่มุนทุกมุมของหน่วยเซลล์ (unit cell) และมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าต่ำกว่า อาทิเช่น K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} และ Pb^{2+} ส่วนที่ตำแหน่ง B (B-site) ซึ่งอยู่ตรงกลางของหน่วยเซลล์จะมีอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดเล็กและมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าสูงกว่า อาทิเช่น Ta^{5+} , Ti^{4+} , Zr^{4+} และ Sn^{4+} โดยไอออนบวกนี้จะถูกกล้อมรอบด้วยไอออนลบของออกซิเจน 6 ตัวจับตัวกันเป็นรูปหกเหลี่ยม (octahedral) ดังแสดงในรูปที่ 1

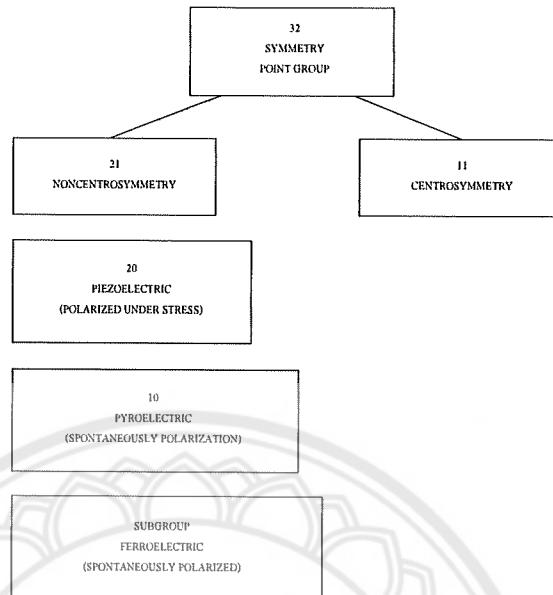


รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างแบบเพอร์อฟสไกต์ (ABO_3)

2.2 โพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) [1]

คำว่า “โพอิโซ (piezo)” มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “กด” ดังนั้นสมบัติโพอิโซอิเล็กทริก คือ การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกด ซึ่งเป็นแรงทางกลประภูมิการณ์โพอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ชองส์ และปีแอร์ คูรี (Jacques and Pierre Curie) ในปี ค.ศ. 1880 ขณะที่ศึกษาผลของการดันต่อประจุไฟฟ้าของผลึกบางประเภท เช่น ควอร์ซ (quartz) ชิงค์เบลน (zincblende) หัวมาลีน (tourmaline) การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกดซึ่งเป็นแรงทางกลทำให้เกิดความเครียด (strain) ในผลึก มีผลทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของไดโอล โนเมเนต (dipole moment) ไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่า การโพลาไรเซชัน (polarization) และให้กระแสไฟฟ้าออกมานโดยปริมาณและเครื่องหมายของการโพลาไรเซชันจะแปรผันตามความเครียดที่ได้รับ และในทางกลับกันเมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่สารจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความเครียด ขึ้นในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป

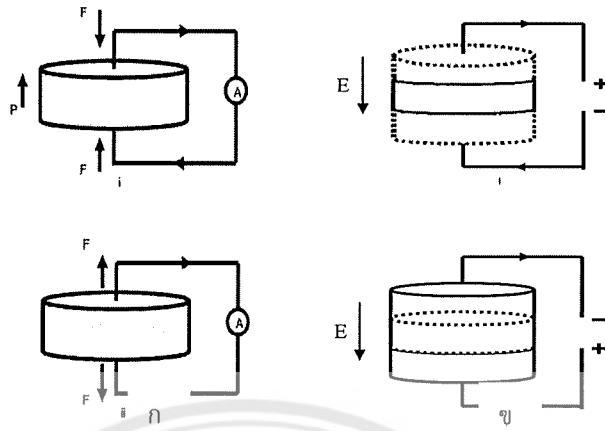
ความเข้าใจในโครงสร้างภายในของวัสดุนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสมบัติโพอิโซอิเล็กทริกของของแข็ง เมื่อทำการพิจารณาวัสดุที่มีผลึกเดียวพบว่า ผลึกมีองค์ประกอบทางเคมีคงที่ และประกอบด้วยไอออน (อะตอมที่มีประจุ) เรียงตัวกันช้าๆ ต่อกันเป็นเครือข่าย เกิดเป็นระบบผลึก (lattice) หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความสมมาตร เรียกว่า หน่วยเซลล์ (unit cell) และเป็นตัวบวกความเป็นไปได้ของกรรมสมบัติโพอิโซอิเล็กทริกในผลึก เนื่องจากความสามารถของโครงสร้างผลึกภายในถูกสะท้อนด้วยความสมมาตรของสมบัติที่วัสดุนั้นแสดงออก



รูปที่ 2 การแบ่งกลุ่มของผลึกของวัสดุใน 32 กลุ่ม

นักผลึกศาสตร์แบ่งผลึกออกเป็น 32 กลุ่ม ดังแสดงในรูป 2 จากผลึก 32 กลุ่ม ดังกล่าวมี 21 กลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (noncentrosymmetric) ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฟอิโซเล็กทริกซึ่งพบร่อง 20 กลุ่ม อีกหนึ่งกลุ่มที่เหลือไม่มีสภาพเป็นไฟอิโซเล็กทริกแม้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง เพราะเกิดปรากฏการณ์พิเศษบางอย่าง การไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางเป็นสภาวะสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพไฟอิโซเล็กทริกเนื่องจากแรงกดที่ให้กับวัสดุเป็นแบบที่มีสมมาตรของศูนย์กลาง และไม่สามารถทำให้เกิดการโพลาไรเซชัน เช่น การเกิดโพลาไรเซชันแบบเวกเตอร์ (vector-quality-like Polarization) นอกจากว่าวัสดุนั้นจะมีลักษณะไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางอยู่ ซึ่งจะทำให้ผิดรวมของการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบสามารถสร้างได้ไฟฟ้าขึ้นมา หรือที่เรียกว่าเกิดโพลาไรเซชันนั่นเอง ความแตกต่างของวัสดุที่เป็นไฟอิโซเล็กทริกกับเฟอร์โรอิเล็กทริกคือ วัสดุไฟอิโซเล็กทริกไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตัวมันเอง แต่จะเกิดเมื่อให้แรงทางกลต่อผลึกเท่านั้น

สภาพไฟอิโซเล็กทริกเกิดขึ้นได้สองแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นตรง (direct effect) และแบบผันกลับได้ (converse effect) ซึ่งแบบแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันเมื่อสารถูกแรงกระทำ (หรือเกิดความเด่น) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซเล็กทริกแบบ direct effect เช่น เครื่องกำเนินสัญญาณ (generator) ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาตร (หรือเกิดความเครียด) ในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซเล็กทริกแบบ converse effect เช่น มอเตอร์ (motor) ซึ่งกลไกทั้งสองแบบแสดงในรูปที่ 3 และระดับการเกิดโพลาไรเซชันจะขึ้นกับระดับความเครียดที่เกิดจากแรงที่ได้รับ และเครื่องหมายของประจุที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าแรงที่ให้เป็นแรงดึงหรือแรงกด



รูปที่ 3 แสดงปรากฏการณ์ไฟอิโซเล็กทริก (ก) แบบ direct effect (ข) แบบ converse effect

สมบัติดังกล่าวอาจจะพบได้ในไฟอิโซเล็กทริกเซรามิก ซึ่งก็คือ เฟอร์โรอิเล็กทริกที่ผ่านการสร้างข้าว (poling) นั่นเอง ในระหว่างกระบวนการสร้างข้าวสุดจะเกิดการขยายตัวตามแนวแกนการสร้างข้าวเล็กน้อย และเกิดการหดตัวในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางเล็กน้อยเช่นกัน ระดับความแรงของสนามที่สร้างข้าวและอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการจัดทิศทางและสมบัติที่ได้ของวัสดุ การจัดเรียงตัวไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์และโครงสร้างผลึกของวัสดุก็เป็นสิ่งที่บอกร่องรอยการสร้างข้าวได้ด้วย เช่น เพสเทรอโนล ทำได้ถึงร้อยละ 83 เพสรมโนบอธีดรอลทำได้ถึงร้อยละ 86 และสำหรับเฟสออร์โรรอมบิก มากถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นค่าที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากผลึกเดียวหรือโดยเมนเดีย กล่าวได้ว่าเซรามิกทุกชนิดที่ผ่านการเผาผนึก (sintering) แล้วจะมีสภาพเมื่อมองโดยรวมมี

สมบัติเหมือนกันในทุกทิศทาง (isotropic) และจะต้องผ่านการสร้างข้าวเพื่อทำให้เป็นไฟอิโซเล็กทริก โดยที่วัสดุเหล่านั้นเป็นทั้งสารเฟอร์โรอิเล็กทริก และเป็นไฟอิโซเล็กทริกด้วยกระบวนการสร้างข้าวเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสภาพไฟอิโซเล็กทริกในเซรามิกนิดเฟอร์โรอิเล็กทริก หากไม่มีการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไฟอิโซเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไฟอิโซเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวมีประ年之久มากตามนี้เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิคิรี (curie temperature: T_c) เพราะเซรามิกจะเสียสภาพโพลาไรเซชันที่เกิดจากการสร้างข้าวที่อุณหภูมิสูงกว่า T_c จาก 20 point groups ของผลึก noncentrosymmetric ที่เป็นไฟอิโซเล็กทริกจะมีอยู่ 10 point groups ที่มีข้าว (polar) เกิดได้โพลโมเมนต์ได้ด้วยตนเอง แม้ไม่ได้รับสนามไฟฟ้ากระทำ เรียกกลุ่มสารพุกนี้ว่า สปอนทาเนอส โพลาไรเซชัน (Spontaneous Polarization) ผลึกมีข้าวเหล่านี้เป็นไฟอิโซเล็กทริกอย่างมาก และในกรณีที่ให้สนามไฟฟ้าแรงพหุที่เข้าไปจะทำให้ทิศทางของเวกเตอร์โพลาไรเซชัน เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในสาร point groups นี้เรียกว่า เฟอร์โรอิเล็กทริก นั่นคือ สารเฟอร์โรอิเล็กทริกทุกชนิดเป็นสารไฟอิโซเล็กทริก แต่ไฟอิโซเล็กทริกไม่จำเป็นต้องเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก จะแสดงสมบัติของโมเมนต์คู่ควบ (dipole moment) ถึงแม้ว่าเราได้นำสนามไฟฟ้าออกแล้วก็ตาม กล่าวว่ามี ไดโพลโมเมนต์การอยู่ในผลึกในสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริก จุดศูนย์กลางของประจุบวกของผลึกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับประจุลบ เมื่อ

เราอาจสารไดอิเล็กทริกมากวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดโพลาไรเซชัน ขันภายในสารนั้น และเมื่อลดสนามไฟฟ้าที่ให้จนเป็นศูนย์ โพลาไรเซชันในสารไดอิเล็กทริกก็จะกลับเป็นศูนย์ทันที แต่มีสารบางอย่างเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปทำให้เกิดมีโพลาไรเซชัน และเมื่อเราลดสนามไฟฟ้าลงจนเป็นศูนย์ โพลาไรเซชันจะไม่เป็นศูนย์ในสารไดอิเล็กแต่มักจะเป็นศูนย์เมื่อ $E = -E_c$ แสดงว่าในสารมีโมเมนต์ขั่วคู่ ถ้าเราอยู่แล้วหรืออาจกล่าวได้ว่าสารนั้นแสดงสถานะเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและอาจทำให้สารแสดงสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกโดยไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าเลย แต่เราใช้การลดอุณหภูมิแทน โดยปกติสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกจะไม่ปรากฏที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แน่นอนค่าหนึ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤต (T_c) ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตนั้น ผลึกจะอยู่ในสถานะพาราอิเล็กทริก (paraelectric)

2.3 เฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric) [12]

สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ จึงทำให้สามารถสร้างได้เพลี้ยงมาได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกล ซึ่งสามารถแยกสารเฟอร์โรอิเล็กทริกออกจากวัสดุไดอิเล็กทริก ด้วยการตัดถั่วหรือรีเม้นท์ โพลาไรเซชัน (remanent polarization: P_r) เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเป็นศูนย์ โดยปกตินั้นโพลาไรเซชัน (P) เป็นผลมาจากการไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงขั่วคู่ของatom (atomic dipole) หรือขั่วโมเลกุล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบในสารหล่ายชนิดโพลาไรเซชันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้า \bar{E} มีความเข้มน้อย

$$\bar{P} = \epsilon_0 \chi_e \bar{E} \quad (1)$$

เมื่อ χ_e เป็นค่าคงที่เรียกว่าสภาพรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลางค่าของ χ_e ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ ϵ_0 เป็นสภาพย้อมของสูญญากาศ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ โปรดสังเกตว่าสนามไฟฟ้า \bar{E} ในสมการ (1) นี้เป็นสนามไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุอิสระและส่วนของโพลาไรเซชันที่สนาม \bar{E} ผลิตขึ้นเอง

χ_e ไม่มีทิศทาง และการจัดไฟฟ้า (electric displacement: D) มาจากการกระจายประจุอิสระเท่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + P \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \epsilon_0 \chi_e \bar{E} = \epsilon_0(1+\chi_e) \bar{E} \quad (3)$$

ดังนั้นไม่พึงแต่ P เท่านั้นที่ขึ้นกับ \bar{E} แต่ \bar{D} ก็ขึ้นกับ \bar{E} ด้วยเช่นกัน

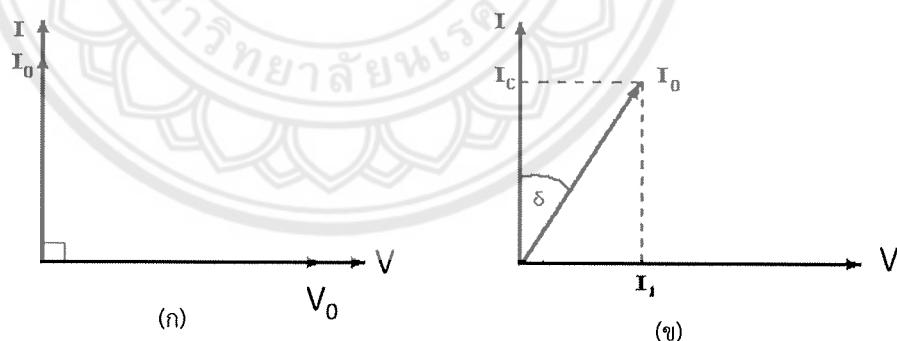
$$\bar{D} = \epsilon \bar{E} \quad (4)$$

$$\epsilon = \epsilon_0(1+\chi_e) \quad (5)$$

เรียก ϵ ว่า สภาพยอน (Permittivity) ของวัสดุในสัญญาการ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาไรซ์ ดังนั้นสภาพรับไว้ได้ทางไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์และสภาพยอน (ϵ) จะมีค่าเท่ากับ ϵ_0 และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (6)$$

เมื่อ ϵ_r คือ สภาพยอนสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกในวัสดุ เฟรโรอิเล็กทริก ส่วนใหญ่ค่าคงที่ได้อิเล็กทริก ϵ จะมีค่าสูง ดังนั้น $P >> \epsilon_0 E$ และ $D \approx P$ เมื่อ ป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับวัสดุได้อิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดได้โดย ภายในวัสดุได้อิเล็กทริก ในกรณีอุดมคติ ได้โดยภายในวัสดุได้อิเล็กทริกสามารถถลับทิศทางได้ตาม ความถี่ของแหล่งกำเนิด กรณีกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) มีความต่างเฟสกันอยู่ 90 องศา ดัง รูปที่ 4 (ก) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ I และ V เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสีย พลังงานของวัสดุได้อิเล็กทริก (dielectric loss: $\tan \delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการถลับทิศทาง ของไดโอลจะก่อให้เกิดความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีนี้ กระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้ามีความต่างเฟสกันน้อยกว่า 90 องศา ดังรูปที่ 4 (ข) โดยการสูญเสียพลังงาน ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถวัดได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภาพยอน

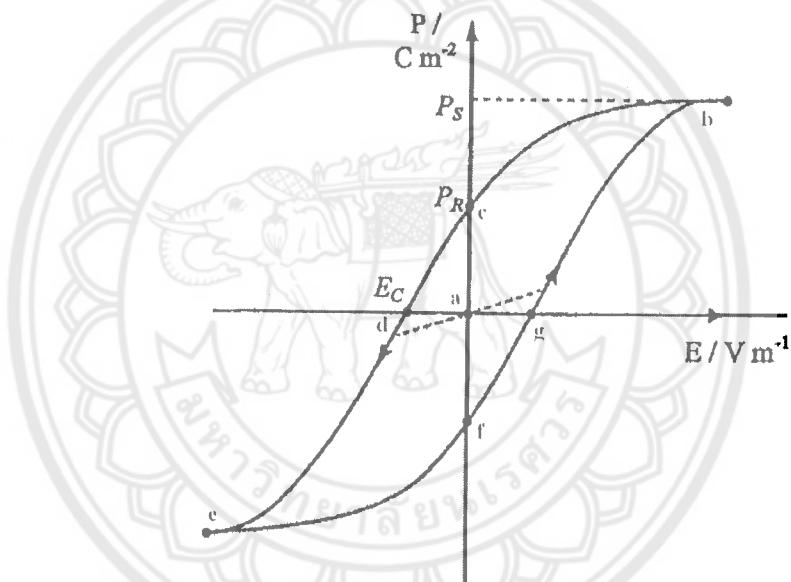


รูปที่ 4 ความต่างเฟสระหว่างกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) ของวัสดุได้อิเล็กทริก
(ก) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (ข) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกการถลับทิศทางของไดโอลตามความถี่ของแหล่งกำเนิดได้ความสัมพันธ์ระหว่าง การโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์จะพบในภาพของ วงรอบไฮสเตอรีซิส (hysteresis loop) ดังภาพ 5 เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดโพลาไรเซชันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (saturation polarization) คือ จุด b ซึ่งการเกิด โพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุด ไดโอลหั้งหมดจะเรียงตัวแน่นกัน และหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านั้น

ก็ไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชัน เมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การโพลาไรเซชันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดิมเหมือนตอนเริ่มต้น ($P = 0$) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน

แม้ว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ($E = 0$) แก่วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกก็ตาม แต่ยังคงมีโพลาไรซ์ลงเหลืออยู่ หรือรีเมานท์ โพลาไรเซชัน (remanent value: P_R) ที่จุด C ถ้าเราต้องการกำจัดโพลาไรเซชันที่ยังคงเหลืออยู่ เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (นั่นคือ $-E$) โพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกจุดนี้ว่าสนามโคเออร์ซีฟ (coercive field: E_C) ถ้าเราพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีก ในที่สุดก็จะถึงจุดอิ่มตัว ที่จุด C ข้ามไปโลหะทั้งหมดซึ่ไปทางขวา เมื่อถึงจุดอนนี้ ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุเฟอร์โร อิเล็กทริก แล้วปล่อยให้วัสดุที่มีโพลาไร เซชันเพิ่มขึ้นไปทางขวา ยังจุด f เพื่อให้ครบวงจร ต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอีกรอบในทิศทางบวก โพลาไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด g และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวที่จุด b



รูปที่ 5 วงรอบอิสเทอร์จิสระระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟอร์โรอิเล็กทริก

2.4 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric property) [13]

วัสดุไดอิเล็กทริก เป็นชนิดหนึ่งของอนุวัชื่นไม่น่าไฟฟ้า และยังสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อีกด้วย ซึ่งค่าความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก เรียกว่า ค่าความจุไฟฟ้า (capacitance) เมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่สารไดอิเล็กทริก สารไดอิเล็กทริกจะเกิด polarization ขึ้นซึ่งเท่ากับ ค่าผลรวมของโพลาไรเซชันต่อหน่วยปริมาตร (net polarization/unit volume) ซึ่งถ้าค่า polarization สูงก็จะส่งผลให้สารไดอิเล็กทริกมีค่า capacitance สูงตามไปด้วย โดยสมบัติทางไดอิเล็กทริกมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ตัว คือค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity: ϵ_r) ความคงทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) และค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss) ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity: ϵ_r)

พิจารณาตัวเก็บประจุอย่างง่ายคือ แผ่นนานาที่ทำด้วยโลหะโดยวางห่างกันด้วยระยะ d พื้นที่ของแผ่นเท่ากับ A ดังแสดงในรูปที่ 6 ระหว่างแผ่นนานาเป็นสูญญากาศ เมื่อมีศักย์ไฟฟ้า V คร่อมแผ่น

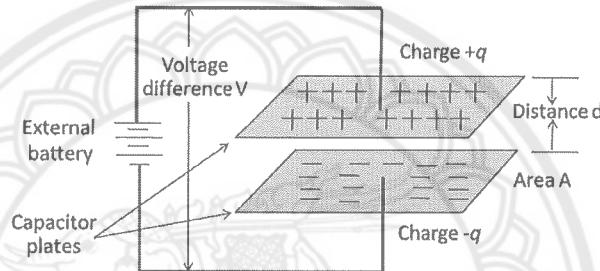
ขนานโดยที่แผ่นโลหะแผ่นประจุ $+Q$ และอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุ $-Q$ ค่าประจุนี้จะเป็นสัดส่วนกับ V ดังสมการ 7

$$Q = CV \quad (7)$$

หรือ

$$C = \frac{Q}{V}$$

เมื่อ C คือ (capacitance) มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ต่อโวลต์ (C/V) หรือ พารัด (F)



รูปที่ 6 แสดงตัวเก็บประจุแผ่นขนาน

ความจุไฟฟ้าบวกถึงความสามารถในการกักเก็บประจุ ยิ่งมีความจุไฟฟ้ามากเท่าใดยิ่งเก็บประจุได้มากเท่านั้น ถ้าหากตัวเก็บประจุมีขนาดพื้นที่ขนานมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นขนานมากๆ จะได้ว่าความจุไฟฟ้ามีค่าดังสมการ (8)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (8)$$

ϵ_r คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่าสภายอมสัมพัทธ์ (permittivity) ในสัญญาากาศ มีค่า 8.854×10^{-12} พารัดต่อเมตร (F/m)

A คือ พื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2)

C คือ ค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นพารัด (F)

d คือ ความนาของสารไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

ในกรณีที่มีสารไดอิเล็กทริกว่าอยู่ระหว่างแผ่นขนาน ความจุไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าซึ่งเท่ากับค่าสภายอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือที่เรียกว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) ของเซรามิก ดังสมการ 9

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} \quad (9)$$

เมื่อ ϵ_0 คือ ค่าส่วนย่อมสัมพัทธ์ (Permittivity) ในสุญญากาศ โดยมีค่าประมาณ 8.854×10^{-12}

¹² ฟาร์ดต่อมเมตร F/m

การมีสารไดอิเล็กทริกอยู่ในตัวเก็บประจุจะช่วยเพิ่มพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุให้สามารถสร้างตัวเก็บประจุขนาดเล็กแต่ความจุไฟฟ้าสูงได้ ความคงทนไดอิเล็กทริก (Dielectric strength) ความคงทนไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพของไดอิเล็กทริกเป็นบริมาณที่บ่งบอกถึงความทนทานต่อความต่างศักย์ของไดอิเล็กทริก ความคงทนได อิเล็กทริกมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ไดอิเล็กทริกยังคงใช้งานได้ โดยปราศจากความเสียหายต่อความยาวหนึ่งหน่วย ถ้าวัสดุไดอิเล็กทริกถูกป้อนด้วยความค่าความค่าศักย์ที่สูงมากๆ อาจจะทำให้แฟกเตอร์สูญเสียพลังงาน (Energy loss factor) ถ้าป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าให้แก่ สารไดอิเล็กทริกที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบขยายน์ แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบขยายน์ แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90 องศา แต่ในความเป็นจริงนั้น สำหรับไดอิเล็กทริกที่หัวไป มุมต่างเฟสจะน้อยกว่า 90 องศา เสมอ ถ้าให้ δ คือค่ามุมที่นำไปลบออกจาก 90 องศา ปริมาณ $\tan \delta$ จะหมายถึง แฟกเตอร์สูญเสียพลังงานในไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเมื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2.5 การขันเตอร์

การขันเตอร์ (sintering) คือกระบวนการทางความร้อนที่ทำให้อุ่นภาคเกิดการสร้างพันธะกันอย่างสมดุล โดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็งที่พัฒนามาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพันธะเข้มต่อกันดังกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรงสูงขึ้น และมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจจะกล่าวได้ว่าการขันเตอร์นั้นมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคผงเริ่มต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เข้มอยู่ติดกันแล้วเกิดการเดิบโตไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสภาพขั้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกันของเกรนต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขันเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการขันเตอร์นั้นได้มาจากแรงดึงดูดที่ผิวและพลังงานของผิวน้ำตัวการให้ข่อง แข็งที่เข้มยึดกันโดยมีพลังงานของเกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง (γ_{ss}) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่กุ่มน้ำคองที่ยึดกันอยู่อย่างหลวมๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ (γ_{sv}) ที่สูงมากด้วยเหตุนี้เองการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้อุ่นภาคผงตั้งตันที่มีขนาดอนุภาคเล็ก เนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการขันเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ขั้นงานสามารถเกิดการແแนนตัวได้ ซึ่งมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [14]

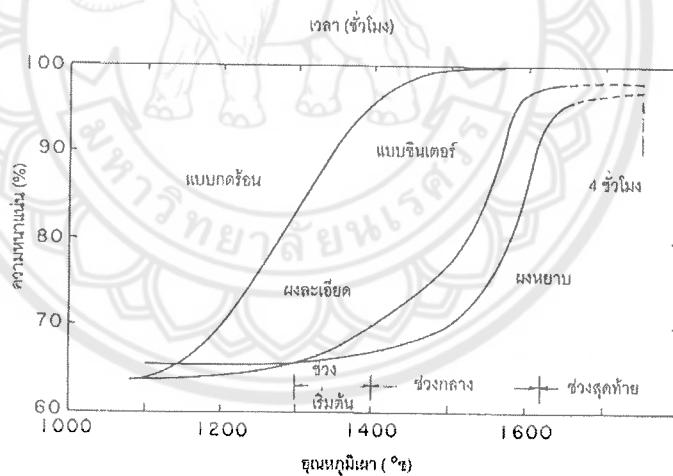
การหดตัวของขั้นงานเซรามิกขณะที่ทำการขันเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดหรือหาค่าความหนาแน่นของขั้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา ดังเช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการขันเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ทั่ว ๆ ไป ที่แสดงตั้งรูปที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความคานเกี่ยวต่อเนื่องกันอยู่คือ

1. การขันเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ของอนุภาคผงภายในขั้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัส

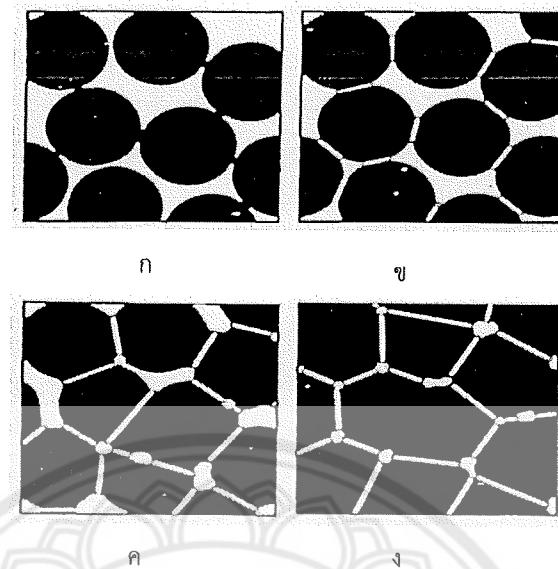
ระหว่างอนุภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของขึ้นงานในช่วงนี้อาจเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการท่ออนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รูปที่ 8 (ข)

2. การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและ ปริมาณของความพรุนในขึ้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดติดกัน มากยิ่งขึ้น ทำให้ขึ้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มนีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมี การเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ซองว่างของรูพรุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อกัน (พวกรูพรุนเปิด) และจะสิ้นสุด พฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพรุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพรุนปิด) การหดตัวของ ขึ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ ขึ้นงานมีค่าสูงถึงประมาณ

3. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย (final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพรุนในขึ้นงานเริ่มปิดตัวลง และค่อยๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากชิ้นงานอย่างช้าๆ โดยอาศัยกลไกการแพร่ของอากาศจากรูพรุน ออกมานาตามแนวของขอบเกรน แล้วหลุดออกไปจากผิวของขึ้นงาน ซึ่งจะทำให้ขึ้นงานเกิดการแน่นตัว เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเพียงเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ รูปที่ 8 (ง)



รูปที่ 7 แสดงพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่วๆ ไปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา



รูปที่ 8 แสดงพัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (ก) อนุภาค พยักถักกันอยู่แบบหลวมๆ หลังการอัดขึ้นรูป (ข) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (ค) การซินเตอร์ช่วงกลางและ (ง) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว (liquid phase sintering) เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุเกิดการหลอมเหลวขึ้นก่อนภายสภาวะไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิกด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลงเนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุพอกเซรามิกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 300 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเตาไฟอยู่ไม่กี่ประเภทที่สามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องปฏิกริยาระหว่างสารในภาชนะที่หลอมตัวกับภาชนะเองได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ขั้นงานเกิดการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มาก จึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

- ระบบที่ไม่เป็นเนื้อดียกัน เมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระแทกอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และเมื่อขั้นงานเริ่มเย็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็งตัวแยกเฟสอยู่ในขั้นงาน
- ระบบที่มีความเป็นเนื้อดียกันเมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระแทกอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อยๆ หายไปช้าๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของขั้นงาน

กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

1. ระยะที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการหลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูดเล็กจากของเหลวตึงเข้าการกัน ทำให้หินงานเกิดมีการหดตัวอย่างรวดเร็ว และมีการกำจัดรูพรุนออกไปจากหินงาน
2. ระยะที่อนุภาคมีการแยกออกจากกันแล้วเกิดการตกตะกอนช้า (dissolution reprecipitation stage) มีหลายกรณีที่อนุภาคของแข็งสามารถละลายในเฟสที่เป็นของเหลวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งความโค้งของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสัมผัสระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมีการแยกออกจากกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการละลายขึ้น ตัวถูกละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความโค้งตรงกันข้ามภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการตกตะกอนจนทำให้เกรนบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่งตัวที่ตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่

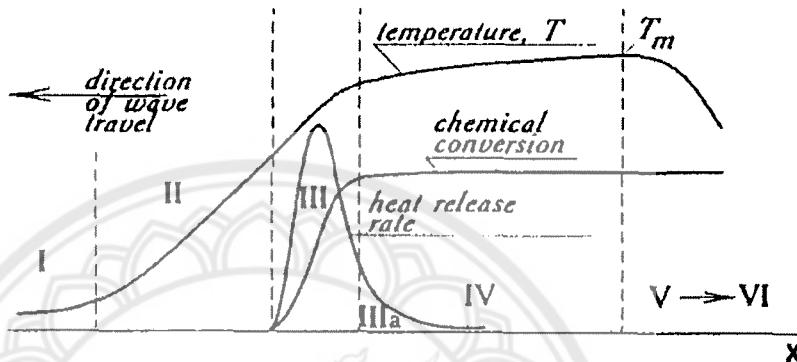
ที่มีองค์ประกอบของหินที่ได้จากเฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการตกตะกอนในลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการตกตะกอน

3. ระยะที่ของเหลวมีการสมานลักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปประปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจเข้าไปแทนกันด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจากการดูดซึบของเหลวหรือเกิดเฟสใหม่ที่ตกผลึกมาจากสารที่เกิดการหลอม
4. ระยะที่มีการเติบโตของเกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกรีดออกมากจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการแพร่ซึมเข้าไปอยู่ภายในของแข็งจะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากฏขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเตอร์อยู่ก็จะมีพฤติกรรมการเติบโตของเกรนเป็นขั้นตอนหลักที่ค่อยควบคุมพุติกรรมของการซินเตอร์ต่อไป

2.6 เทคนิคการเผาไหม้ [15]

การเตรียมผงผลึกด้วยวิธีการการเผาไหม้ เป็นการใช้ประโยชน์จากการปลดปล่อยพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Bektov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการผลิตเทาหลอมเหล็ก การผลิตเพอร์โตรัลลอย ฯลฯ อายุ่ริเก็ตตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ (combustion) ยุคใหม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัติมา (ในปี ค.ศ. 1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ. 1950-1960 สำหรับของเหลว) ในปี ค.ศ. 1967 ได้มีการค้นพบปราภภารณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้บนพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีการเผาไหม้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเผาไหม้มี

การใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุขั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์พลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดย การประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีการเผาไหม้และโครงสร้างจนพลศาสตร์หันภาค ของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของการเผาไหม้ ได้ดังรูป 9



รูปที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการเผาไหม้

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามีอิทธิพลการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กว้างที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟสีและโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จะทำให้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับไฟสี โครงสร้าง เงื่อนไข และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ

2.7 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer) [16]

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (Non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก

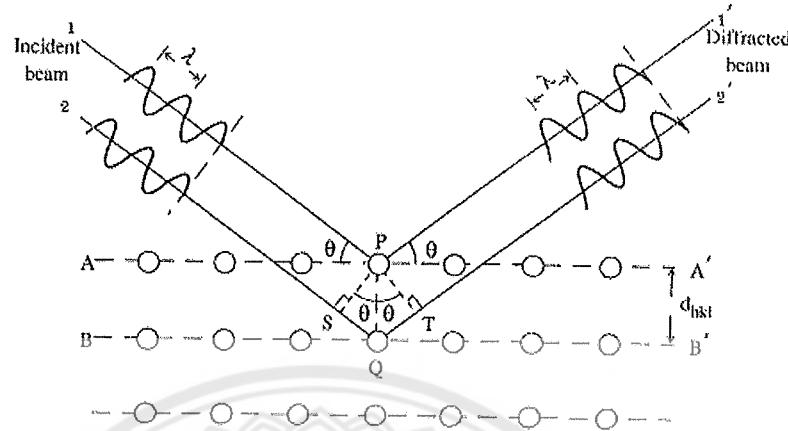
รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 Å strom การเกิดอันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้

1. ใช้เคราะห์ทางค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสราตุกมันตรังสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออะตอมได้รับการกระตุ้นด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าของอะตอม ทำให้เกิดอันตรกิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนขึ้นในโคลอต่าง ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้นเกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ่อนอกมาในลักษณะพัลส์ (pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระตุ้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณขั้นโคลอิเล็กตรอน คือ

(1) รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดียว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์นิดนึงนี้เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุนิดอื่น ๆ หรือไฟฟ่อนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงโคลอตขั้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนขึ้นในวงโคลอตได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของขั้นวงโคลอต ทำให้หลุดจากวงโคลอตเกิดท่าว่างของอิเล็กตรอนในขั้นวงโคลอตขึ้น ทำให้อะตอมอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นและจะลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคลอตในขั้นดังไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคลอตขั้นในด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานิรูปรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ซึ่งว่างของวงโคลอตขั้นใน พลังงานส่วนเกินนี้มีค่าเท่ากับความต่างของระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคลอตของอิเล็กตรอน และชนิดของธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

(2) รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุดถึงสูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคูลอมบ์ (coulomb field) บริเวณใกล้บีบีเคเลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาก่อนที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะทำอันตรกิริยากับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้บีบีเคเลียสที่เกิดจากประจุของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอน ดังนั้นพลังงานของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค่ากระจายต่อเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปฐมภูมิ ถ้าอิเล็กตรอนปฐมภูมินี้พลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวงโคลอตขั้นในของอะตอมหลุดออกได้ก็จะเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะค่าปะปนซ้อนอยู่กับスペกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ การปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานี้ค่าความยาวคลื่นได้ ๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมานะ ซึ่งความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดเกิดจากการที่อิเล็กตรอนคายพลังงานที่ได้รับมาทั้งหมดจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระแทบผิวน้ำของผลึกโดยทำมุม θ บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิงด้วยขั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ อีกส่วนหนึ่งของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังขั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะกระเจิงและส่วนที่เหลือก็จะผ่านเข้าไปยังขั้นที่ 3 ของอะตอมดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกค์

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่า ๆ กัน ลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำชานานกัน สิ่งสำคัญในการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาวะ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกรอบ รังสีเดี่ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมควรมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกค์ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แคบ ๆ กระทบผิวน้ำผลลัพธ์เป็นมุม θ เพื่อให้เกิดการเลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อเกิดอันตรกิริยา กับอะตอม O, P และ R ถ้า

$$SQ + QT = n\lambda \quad (10)$$

เมื่อ n คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในเฟลท์ OCD ผลึกก็จะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin \theta \quad (11)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (12)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกค์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึกเชิงซ้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็นลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่า n ที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์ เมื่อชนกับอะตอมของสาร

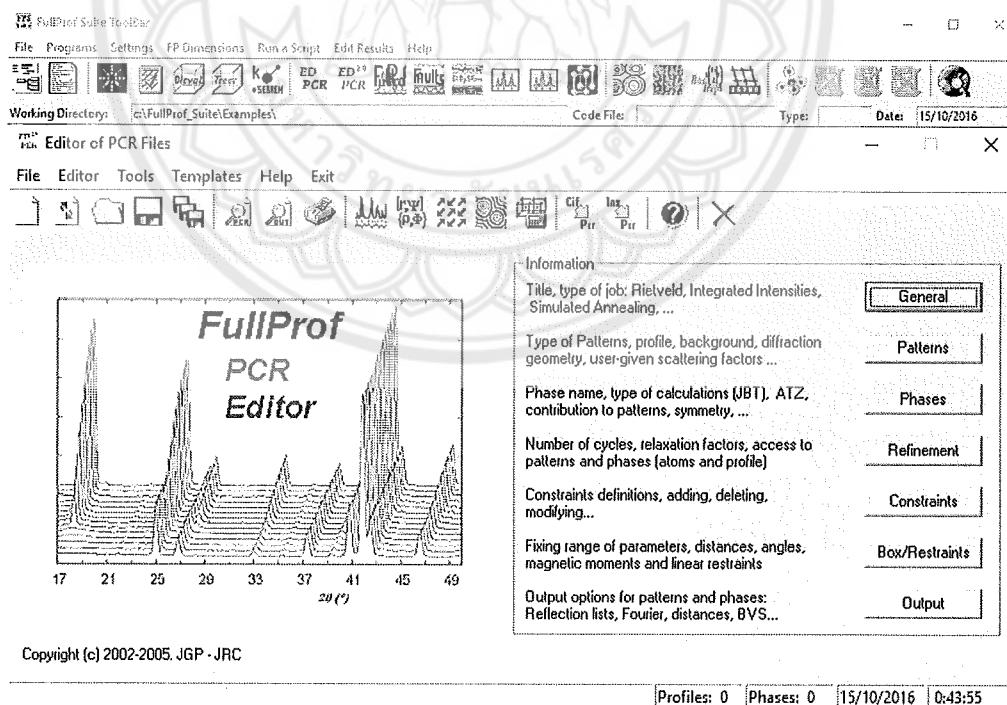
เราจึงทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้นๆ อีกด้วย การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิช c , a และค่าอัตราส่วน c/a สามารถกระทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร์กชัน และจากสมการที่ (13)

$$\frac{1}{d} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (13)$$

ในระบบคิวบิกนั้น ค่าแลตทิช a มีค่าเท่ากับแลตทิช b และ c จากสมการที่ (13) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2} \quad (14)$$

จากนั้นนำข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการหาค่าคงตัวของหน่วยเซลล์และกลุ่มบริภูมิของสารตัวอย่างโปรแกรมฟูลprof (fullprof) โดยโปรแกรมฟูลprofมีลักษณะโปรแกรมดังภาพ 12

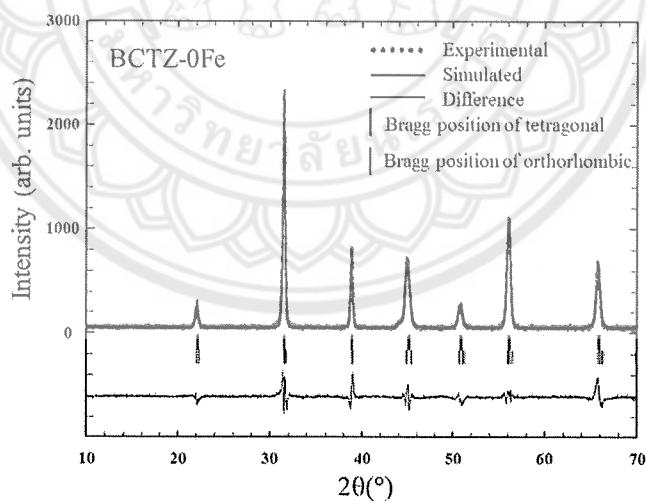


ภาพ 12 โปรแกรม full prof

กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยโปรแกรมฟลูดพรอฟ (Rodriguez, 2000, p.1) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่ได้จากการทดลองกับแบบจำลองโครงสร้างที่ถูกกำหนดขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจโครงสร้างของสารและสามารถหาค่าคงตัวของหน่วยเซลล์ ตำแหน่งอะตอม โดยในการจำลองรูปแบบของโครงสร้างจะต้องมีการใส่ค่าตัวแปรไว้ตั้นดังนี้

1. การปรับค่าเป็นศูนย์ (Zero shift)
2. สัญญาณพื้นหลัง (Background)
3. พารามิเตอร์หน่วยเซลล์ (Unit cell parameter)
4. ความกว้างของพีคที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความเข้มของรังสีเอกซ์สูงสุด (FWHM parameter)
5. ลักษณะของกราฟแบบเกาส์เรียนหรือโลเรนต์ (Pseudo-Voigt factor)
6. ความไม่สมมาตรของโครงสร้าง (asymmetry)

หลักการทำงานของโปรแกรม เป็นการวิเคราะห์ปริมาณสองปัจจัย即ต้องทำให้เส้นกราฟ (สีดำ) ที่เกิดจากการคำนวณไปหันช้อนกับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง (เส้นสีแดง) ให้มากที่สุด แสดงดังภาพ 13



ภาพ 13 หลักการทำงานของโปรแกรม full prof

และพารามิเตอร์ในการคำนวณเพื่อสร้างแบบจำลองดังนี้

1. ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะ (Profile factor)

$$R_p = 100 \frac{\sum_i |y_{oi} - y_{ci}|}{\sum_i y_{oi}} \quad (18)$$

2. แฟกเตอร์ของข้อมูลโดยน้ำหนัก (Weighted profile factor)

$$R_{wp} = 100 \left[\frac{\sum_i |y_{oi} - y_{ci}|^2}{\sum_i w_i y_{oi}^2} \right]^{1/2} \quad (19)$$

3. แฟกเตอร์ค่าคาดหมาย (Expected factor)

$$R_{exp} = 100 \left[\frac{n-p}{\sum_i w_i y_{oi}} \right]^{1/2} \quad (20)$$

4. ค่าความถูกต้อง (Goodness)

$$\chi^2 = \left[\frac{R_{wp}}{R_{exp}} \right]^2 \quad (21)$$

เมื่อ R_p คือ ค่าที่น้อยที่สุดที่ได้จากการกำลังสองน้อยสุด (least-square)

R_{wp} คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสูงพีคที่อยู่เหนือสัญญาณพื้นหลัง

R_{exp} คือ ค่าประมาณที่ดีที่สุดสำหรับชุดข้อมูล

n คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด

p คือ จำนวนพารามิเตอร์ที่ปรับแต่ง

χ^2 คือ ค่าความถูกต้อง

y_{oi} คือ รูปแบบของกราฟจากการทดลอง

y_{ci} คือ รูปแบบของกราฟจากการจำลองโครงสร้างขึ้นมาจากการทดลอง

w_i คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ได้จากการทดลอง

โดยการเปรียบเทียบของกระบวนการทั้งหมดที่ได้จะดูจากค่า R โดยค่า R เหล่านี้ควรจะมีค่าน้อยกว่า 15% จึงเป็นค่าที่ดี สวนคุณภาพของกระบวนการจำลองโครงสร้างดูได้จาก χ^2 ซึ่งควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 จึงจะดี แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 นัยความว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไป

2.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) [17]

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมดากลางให้รังสีแบบอื่นๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกออกจากจะชี้นกับลักษณะของเลนส์แล้ว ยังชี้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้ออกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยกขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยัง

มองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าส่วนนั้นเป็นอะไร ต่อม้าได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์กระจก เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุใด โดยทำให้องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มของเงาแตกต่างกัน

หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง (1,000 ถึง 3,000 อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้ จากนั้น จึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ $10^{-5} - 10^{-7}$ ทอร์ แล้วมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิ่งลงสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์วัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิwtawoyang พอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิwtawoyang หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขาดลวดควบคุมการส่องกราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอนทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิwtawoyang ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอนกระทบผิwtawoyang จะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมธาตุในวัตถุหรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ขึ้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่างๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมาน ซึ่งใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะผิwtawoyang และวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ

(1) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวรอบดับเบล็ก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิwtawoyang

(2) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในขั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมาน ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวรอบดับเบล็กกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

(3) สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M,...) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรออกมาน ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวมภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นวงโคจรด้ไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพ平坦กว้างจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอน

ทุติยภูมิใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระแสเจิงกลับจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อฟีอีน (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัวดักรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเทกซิลิคอนลิเทียม(lithium drifted silicon,Si (Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่องเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

2.9 การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หน่วยของค่าความหนาแน่นสามารถเป็นรัมต่อมิลลิลิตร , รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร , ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเชรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณนั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุได้อีกด้วย

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมีเดสทิกล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ใน

$$\text{ความหนาแน่น } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_{\text{fl}}} \cdot \rho_{\text{fl}} \quad (15)$$

เมื่อ ρ คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

ρ_{fl} คือ ค่าความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็นรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

W_a คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม

W_{fl} คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในกรณีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของของแข็งลงไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_{\text{fl}} = G / V \quad (16)$$

โดยที่ G คือ แรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็ง หน่วยเป็นกรัม (หากได้จากน้ำหนักของ)

ชิ้นงานในอากาศลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของเหลว

V คือ ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density): ρ_r] นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (17)

$$\rho_r(\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_{th}} \right) \times 100 \quad (17)$$

เมื่อ ρ_r คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเบอร์เซ็นต์

ρ_b คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ρ_{th} คือ ค่าความหนาแน่นในทฤษฎีของสาร มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร



1046530

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

๑ ๐๖
๓๗๙
๕
๘๓๒๑
๙๖๒

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. โพแทสเซียมคาร์บอเนต KHCO_3
2. โซเดียมไนเตรต NaNO_3
3. ลิเทียมคาร์บอเนต Li_2CO_3
4. แทนทาลัมออกไซด์ Ta_2O_5
5. ไนโตรเบียมออกไซด์ Nb_2O_3
6. แอนติมอนออกไซด์ Sb_2O_3
7. คอปเปอร์ CuO
8. เหล็ก Fe_2O_3
9. บิสมัท Bi_2O_3
10. ไกลชีน ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$)
11. สารละลายเอทานอล (Ethanol absolution)

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องซั่งแบบละเอียด Satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr (ควบคุมการทำงานด้วยจอเล็กทรอนิกส์) ใช้ซั่งมวลได้มากที่สุดไม่เกิน 310 กรัม โดยมีความละเอียด 0.001 กรัม

2. ตู้อบสาร ยี่ห้อ Memmert D06057 Model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200 องศาเซลเซียส

3. กระปองพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์และมีฝาปิดสนิท โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร

4. เม็ดบดย่อยทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร (ใช้จำนวน 250 เม็ด)
5. เครื่องผสมแบบบดย่อยแบบลูกบด (Ball milling)
6. Hot plate สำหรับใช้ในการทำให้สารระเหยออก
7. Magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากัน
8. ข่อนตักสาร
9. ปีกเกอร์ขนาด 250 ซีซี
10. ปีกเกอร์ขนาด 1000 ซีซี

11. แม่พิมพ์ (Punch and die) ใช้ในการขึ้นรูปเซรามิก
12. กระดาษฟอยล์ (Foil)
13. เครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปเซรามิก อัดแรงตันได้สูงสุด 1000 kgf/cm^2
14. เตาเผาสาร
15. เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer)
16. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (SEM)
17. เครื่อง LCR สำหรับวัดสมบัติโดยอิเล็กทริก
18. เครื่อง Computer controlled modified sawyer tower circuit principle สำหรับวัดสมบัติไฟโรอิเล็กทริก
19. เครื่องวัดสมบัติไฟอิโซอิเล็กทริก (quasi-static d33-meter (Sinocera, YE2730A))

3.3 วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการเตรียมผงพลีกและเซรามิก KNLNTS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

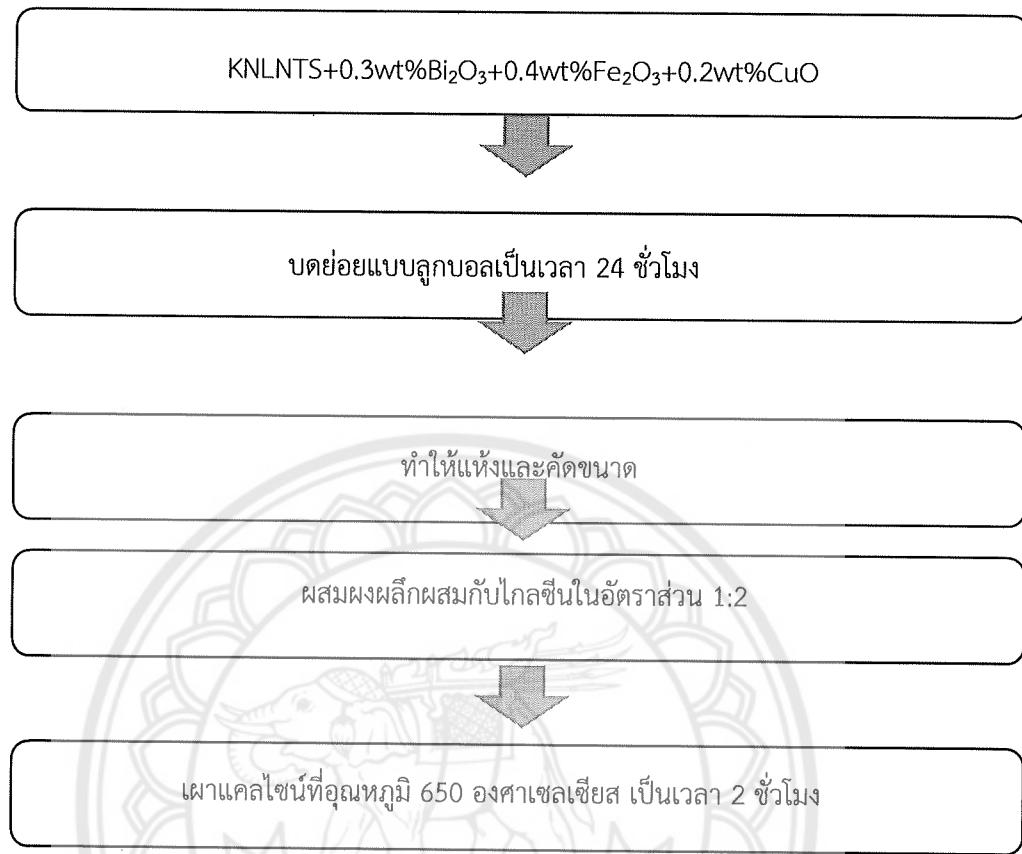
ตอนที่ 1 การเตรียมผงพลีก KNLNTS

1. ขั้งสารตั้งต้น KHCO_3 , NaNO_3 , Li_2CO_3 , Nb_2O_5 , Ta_2O_5 , Sb_2O_3 โดยใช้วิธีทางปริมาณสารสัมพันธ์
2. นำสารที่ได้มาผสานในกระป๋องพลาสติกที่มีลูกบด (ZrO_2) ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร โดยเติมเนอนanol ลงไปให้ท่วมสารซึ่งช่วยให้สารผสานเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ปิดภาชนะนิ่ม เสร็จแล้วนำไปวางบนเครื่องบดย่อยแบบลูกบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้วเทสารลงบนตะแกรงลดที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อล้างแยกของผสมออกจากเม็ดบด และจึงนำ magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากันใส่ลงในบีกเกอร์แล้วนำกระดาษฟอยล์ที่เจาะรูมาปิดก่อนจะนำไปตั้งบนแผ่นให้ความร้อน hot plate เพื่อระเหยเอทานอลออก โดยปรับให้ร้อนประมาณ 150 องศาเซลเซียส
4. เมื่อทำให้อาหารเอทานอลเหยออกจากสารไปหมดแล้ว จึงนำสารไปทำการอบโดยใช้อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าสารจะแห้ง
5. นำสารที่แห้งแล้วมาบดโดยใช้ครกหยก (agate) จากนั้นนำผงสารที่ได้คัดขนาด (sieving) เพื่อให้ได้ขนาดที่สม่ำเสมอ
6. นำสารที่ได้ใส่ในถ้วยอลูминิ娜 นำไปแคลไนในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

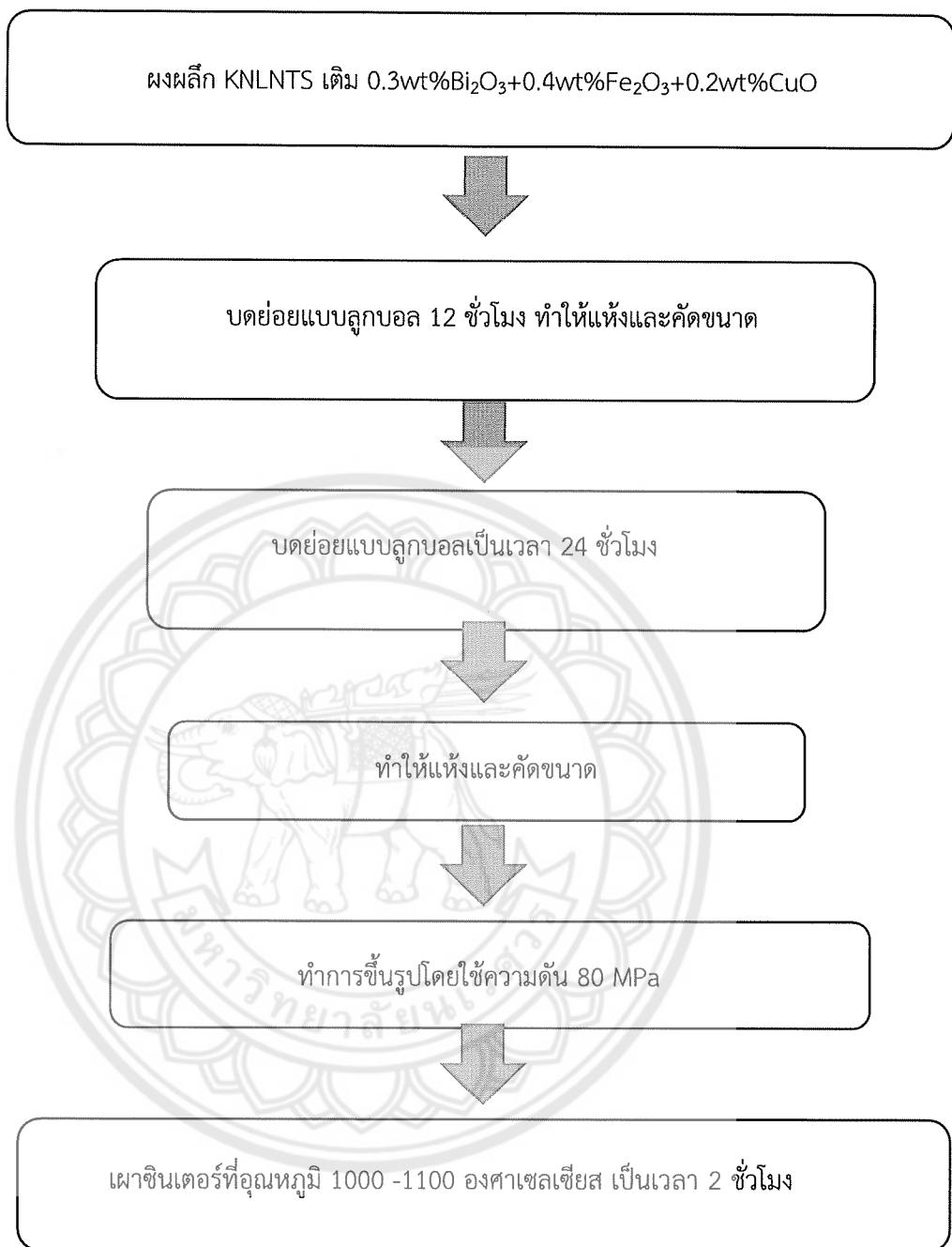
ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO

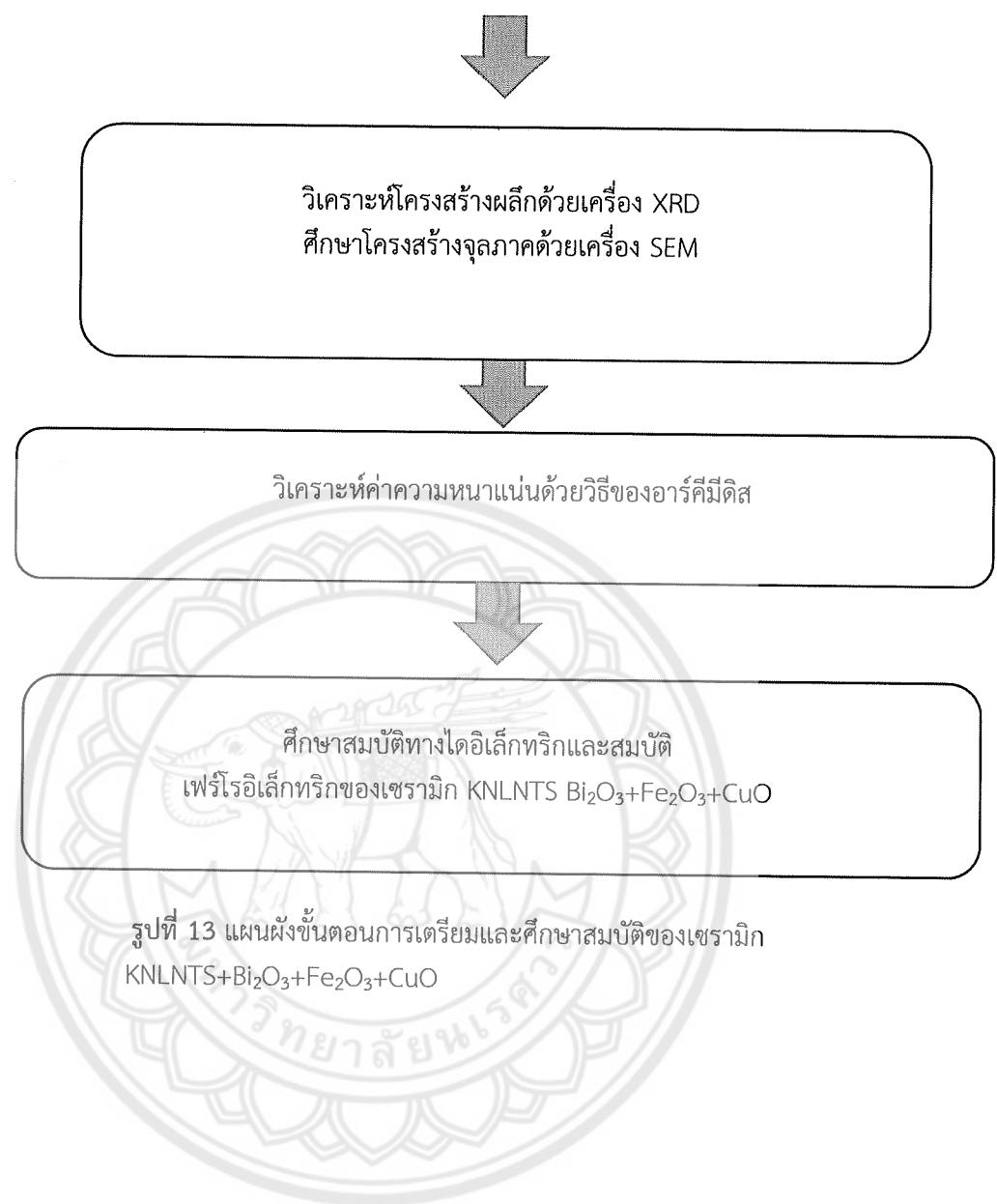
1. นำผงพลีก KNLNTS ที่เผาแคลไนในตอนที่ 1 มาเติม Bi_2O_3 , Fe_2O_3 , CuO ที่ปริมาณ 0.3wt\% , 0.4wt\% , 0.2wt\% ตามลำดับแล้วนำมาใส่ตัวประสาน PVA 3% ผสมในกระป๋องพลาสติกที่มีลูกบด (ZrO_2) รูปทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ใช้จำนวน 400 เม็ด โดยเติมเอทานอลให้ท่วมสาร จากนั้นจึงนำกระป๋องพลาสติกวางบนเครื่องบดย่อยแบบลูกบดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

2. เทสารลงบนตะแกรงลวดที่วางอยู่บนบีกเกอร์ที่มีแท่งเหล็กอยู่ข้างใน เพื่อถางแยกของผสมออกจากเม็ดบล แล้วนำสารที่ได้ไปตั้งไว้บนแผ่นให้ความร้อนโดยปรับความร้อนประมาณ 150 องศาเซลเซียส จนอุ่นของเหลวไปหมด จากนั้นนำสารไปอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าสารจะแห้ง
3. นำสารที่ได้มาบดโดยใช้ครกหยก (agate) จากนั้นนำผงสารที่ได้มาคัดขนาด (sieving) จนได้ผงสารที่ละเอียด
4. นำสารมาอัดขึ้นรูปโดยใช้ความดันที่ 80 MPa เป็นเวลา 30 วินาที โดยเม็ดเซรามิกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร
5. นำชิ้นงาน KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt% CuO ที่ขึ้นรูปแล้ว มาจัดเรียงไว้ในถ้วยอลูมิเนียมที่มีฝาปิดโดยจัดเรียงเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละชั้นจะใส่ผงอะลูมิเนียมมาคั่นไว้
6. นำ KNLNTS +0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt% CuO ไปเผาชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
7. หลังจากการเผาชิ้นเตอร์แล้ว นำเม็ดเซรามิกที่ได้มาตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) โครงสร้างจะกลaacด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตรวจสอบสมบัติโดยอิเล็กทริกด้วยเครื่อง LCR เครื่องวัดสมบัติไฟอิเล็กทริก (quasi-static d33-meter (Sinocera, YE2730A)) และเครื่องวัดวงอิสเทอร์ชีส (computer-controlled modified Sawyer-Tower circuit (Radiant, PLC2-1014346))



รูปที่ 11 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก KNLNTS

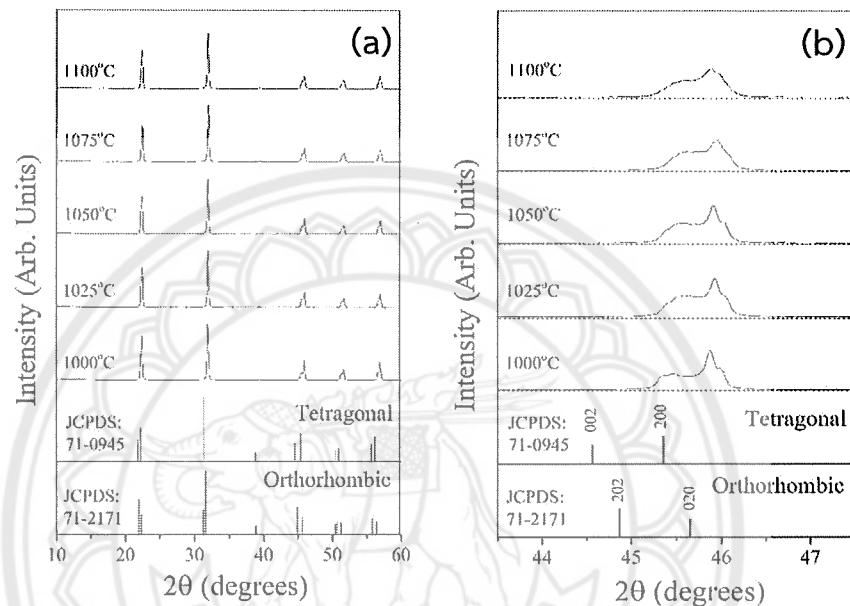




บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

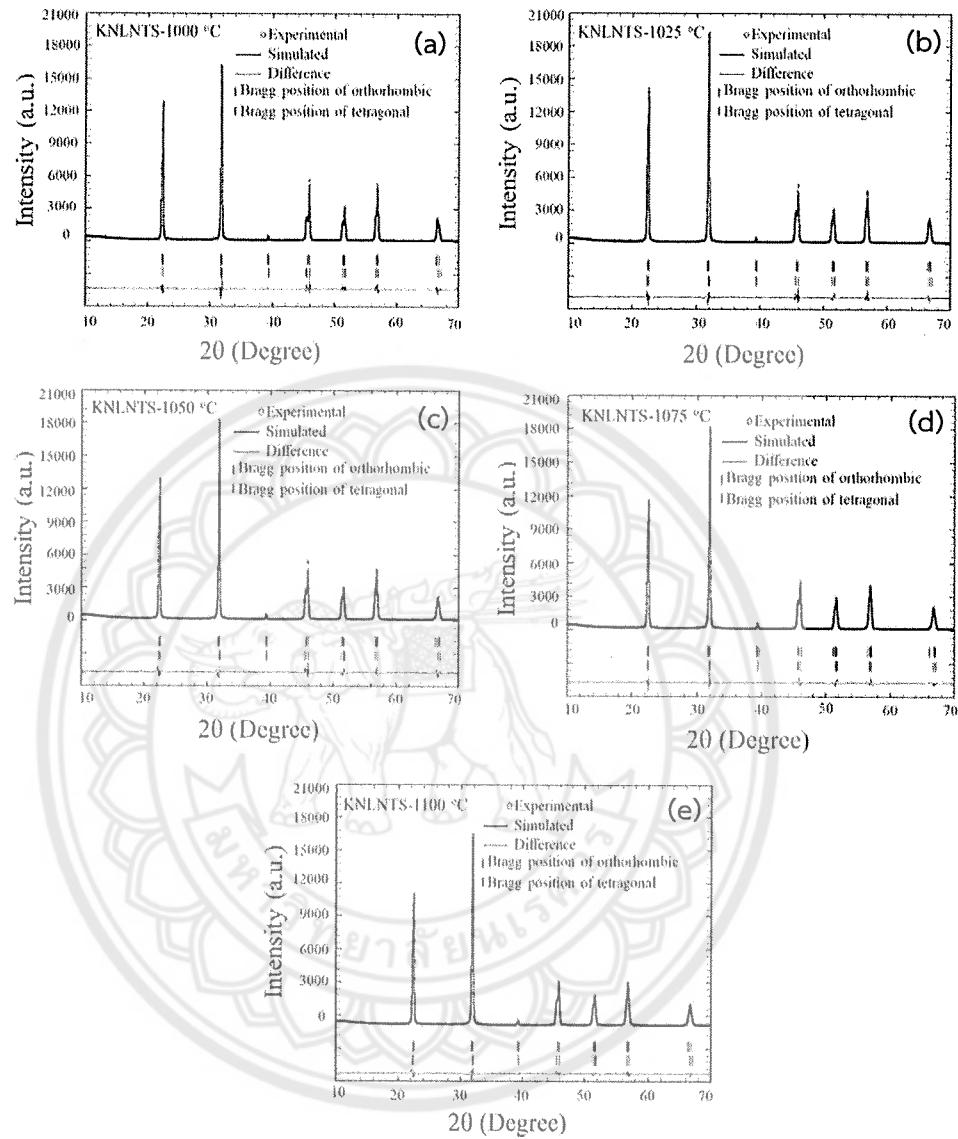
4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000°C – 1100°C



รูปที่ 1 แบบรูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C – 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่มุม (a) 10 – 60° และ (b) 43.5 – 47.5°

รูปที่ 1 แสดงแบบรูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000°C – 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบร่วมกันของโครงสร้างแบบเพอร์ฟไกต์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS) หมายเลข 71-2171 (โครงสร้างออร์โทรอมบิก) และแฟ้มข้อมูลมาตรฐานหมายเลข 71-0945 (โครงสร้างเทแทรบไนล์) (ดังแสดงในรูปที่ 1 (a)) โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างเทแทรบไนล์ (JCPDS หมายเลข 71-0945) จะแสดงพีคคู่ของการเลี้ยวเบน $(002)_T/(200)_T$ ที่มุม ~45° ในขณะโครงสร้างออร์โทรอมบิก (JCPDS หมายเลข 71-2171) จะแสดงพีคคู่ของการเลี้ยวเบน $(202)_T/(020)_T$ ที่มุม ~45° จากการขยายแบบรูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 43.5-47.5° (รูปที่ 1 (b)) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ลักษณะของพีคยกต่อการวิเคราะห์โครงสร้างของเซรามิก เพื่อเป็นการยืนยันโครงสร้างเฟสระหว่างออร์โทรอมบิกและเทแทรบไนล์ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C - 1100°C ผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรม Full prof มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างเซรามิก KNLNTS

+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C - 1100°C โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้แก่ พื้นหลัง (background) ค่าพารามิเตอร์แสดงความกว้างของพีคที่ตำแหน่งความเข้มครึ่งหนึ่งของรังสีเอกซ์สูงสุด (profile half-width parameter (u, v และ w)) นอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างออร์โทромบิก (Amm2) และโครงสร้างเทหะรอนิก (P4bm) ซึ่งมีแลตทิซพารามิเตอร์ (a,b,c) มุ่งหว่าง a, b และ c และตำแหน่งของอะตอมในโครงสร้าง แสดงดังตารางที่ 1 ปรับแต่งพื้นหลังโดยใช้ฟังก์ชัน Chebyshev polynomial และ fitted สปектรัมของเซรามิก KNLNTS+ 0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ที่อุณหภูมิ 1000°C - 1100°C ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย XRD โดยใช้ฟังก์ Psudo-Voigt ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C - 1100°C R_p ≤ 10.6, R_{wp} ≤ 12.0, R_{exp} ≤ 6.66 และ χ^2 ≤ 3.51 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้แสดงดังตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แสดงร้อยละของโครงสร้างเฟสออร์โทромบิก (Amm2) และโครงสร้างเฟสเทหะรอนิก (P4bm) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000 °C เป็น 19.22:80.77 เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1025°C เป็น 1100°C ร้อยละของโครงสร้างออร์โทromบิกเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างเทหะรอนิกลดลง และแลตทิซพารามิเตอร์ของโครงสร้างออร์โทromบิกและเทหะรอนิกแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1025°C แสดงร้อยละของโครงสร้างเฟสออร์โทromบิกและโครงสร้างเฟสเทหะรอนิก เป็น 46.38:53.62

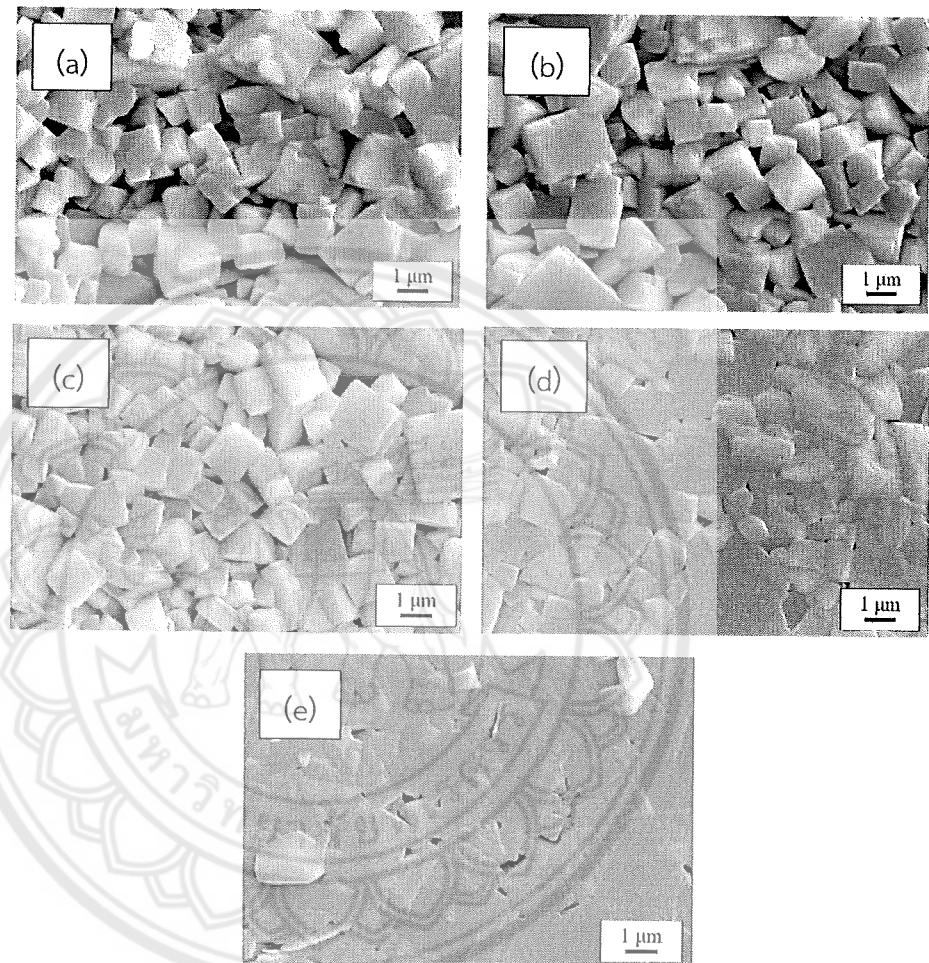


รูปที่ 2 โครงสร้างการเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO ชนเดอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Full prof

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทราย KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ด้วยโปรแกรม Full prof

Sinter temperature (°C)	χ^2	R _p	R _{wp}	R _{exp}	Lattice parameters orthorhombic tetragonal	Orthorhombic tetragonal	Phase fraction (%) tetragonal
1000	2.91	10.6	11.4	6.66	a=3.956 Å b=5.609 Å c=5.641 Å	a=3.954 Å c=3.997 Å	19.23
1025	2.96	9.67	10.7	6.23	a=3.950 Å b=5.606 Å c=5.635 Å	a=3.950 Å c=3.991 Å	46.38
1050	3.51	10.5	12.0	6.41	a=3.952 Å b=5.609 Å c=5.637 Å	a=3.951 Å c=3.992 Å	60.67
1075	2.75	9.95	11.0	6.62	a=3.945 Å b=5.597 Å c=5.660 Å	a=3.953 Å c=3.981 Å	71.92
1100	2.58	9.12	10.6	6.60	a=3.951 Å b=5.606 Å c=5.637 Å	a=3.953 Å c=3.990 Å	80.31
							19.69

4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อเล็กทรอนแบบส่องกราด (SEM) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิรีระหว่าง 1000°C – 1100°C



รูปที่ 3 ภาพถ่าย SEM ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

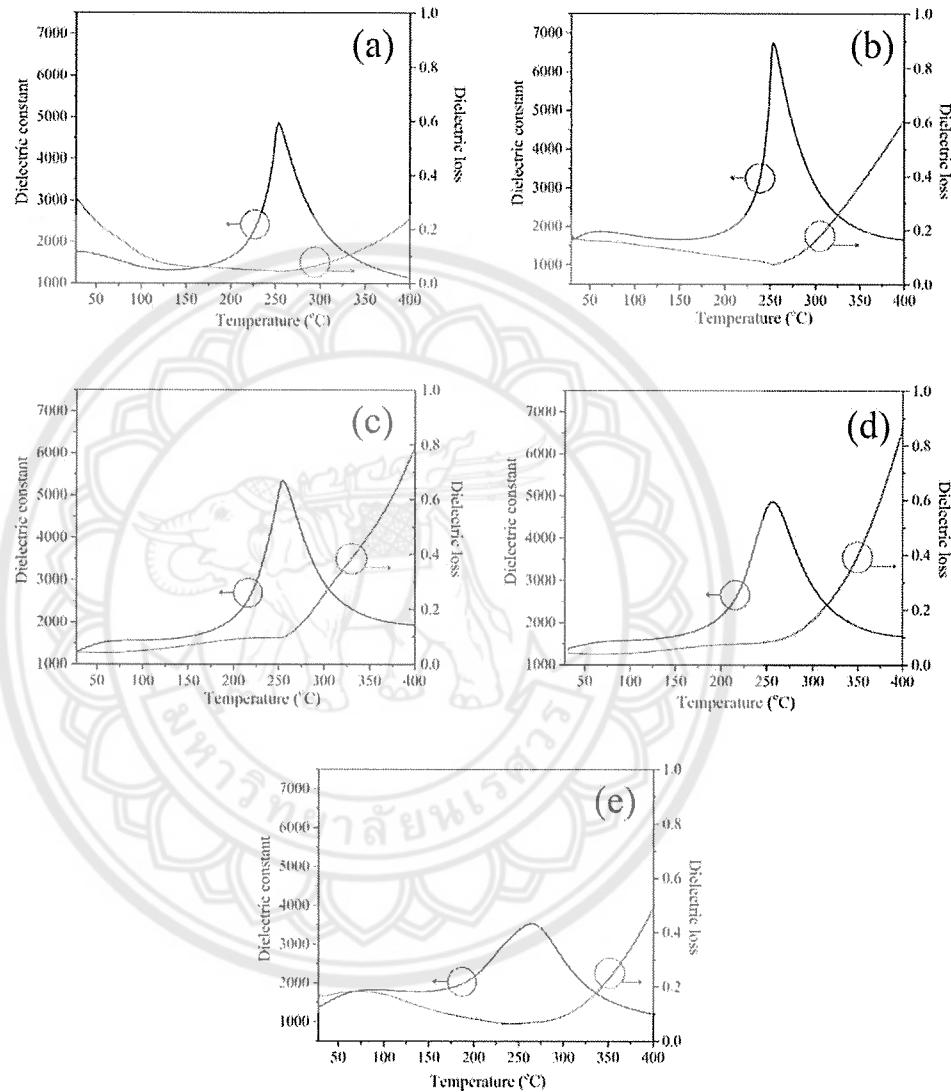
ตารางที่ 2 ขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพัทธ์ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิรีห่วง 1000°C ถึง 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิขึ้นเตอร์ (°C)	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)	ความหนาแน่น (g/cm ³)	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%)
1000	1.30	4.62	97.74
1025	1.36	4.70	99.61
1050	1.27	4.66	98.63
1075	1.59	4.63	97.86
1100	2.29	4.57	96.84

จากการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (SEM) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม้ โดยขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 1000°C-1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 3 (a)-(e) พบว่า เกรนเซรามิกมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมในทุกตัวอย่าง ที่อุณหภูมิขึ้นเตอร์ต่ำ (1000°C) พบรูพรุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนผิวน้ำของเกรนเซรามิกและเกรนมีขนาดเล็ก (รูปที่ 3 (a)) เมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1025°C เป็น 1050°C เกรนเซรามิกมีการเจริญเติบโตที่ดีและรูพรุนลดลง (รูปที่ 3 (b)-(c)) เมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์สูงมากกว่า 1075°C พบร่วมกันของเกรน ดังรูปที่ 3 (d)-(e) ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 ความหนาแน่นของเซรามิกขึ้นเตอร์ KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 4.62 เป็น 4.70 g/cm³ เมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1000°C เป็น 1025°C และค่าความหนาแน่นลดลงเมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1050°C (ตารางที่ 2) การลดลงของค่าความหนาแน่นอาจเกิดจากอุณหภูมิขึ้นเตอร์ที่สูงเกินไปทำให้เกิดการระเหยของธาตุบางชนิด เช่น Na⁺ K⁺ และ Li⁺ ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำทำให้เกิดหลุมและช่องว่างบนผิวน้ำของเซรามิก

4.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก

KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO จันเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000°C – 1100°C



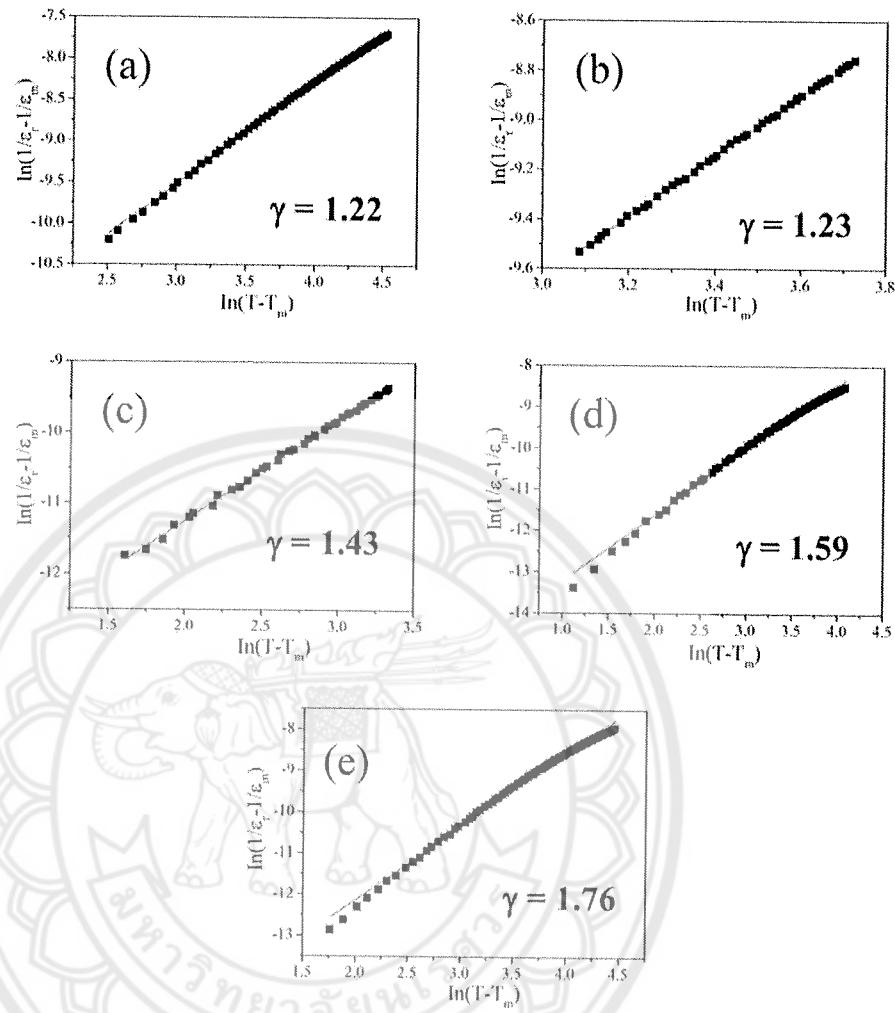
รูปที่ 4 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO จันเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C

ตารางที่ 3 สมบัติโดยอิเล็กทริกของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO

อุณหภูมิชินเตอร์ (°C)	T _{O-T} (°C)	ϵ_r	$\tan \delta$ at T _r	T _c (°C)	ϵ_c	$\tan \delta$ at T _c
1000	38	1761	0.30727	253.41	4854	0.04426
1025	57	1652	0.1760	253.62	6745	0.07345
1050	59	1313	0.04436	254.62	5349	0.09784
1075	68	1350	0.04244	256.58	4867	0.08662
1100	85	1406	0.166	264.48	3532	0.06826

ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ϵ) และค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C ถึง 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ความถี่ 1 kHz แสดงดังรูปที่ 4 ภาพค่าคงที่โดยอิเล็กทริกแสดงพีค 2 พีค ในเซรามิก KNLNTS พีคแรกเกิดที่อุณหภูมิ ~60 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนเฟสจากออร์โตรอมบิกเฟรโรอิเล็กทริกไปเป็นเทหาระโนนลเฟร์โรอิเล็กทริก พีคที่สองเกิดที่อุณหภูมิ ~250 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนเฟสจากเทหาระโนนลเฟร์โรอิเล็กทริกไปเป็นคิวบิกพาราอิเล็กทริก (T_{O-T} ที่อุณหภูมิต่ำและ T_c ที่อุณหภูมิสูง) พบว่าค่า T_{O-T} และ T_c ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งอาจเกิดจากการบิดเบี้ยวของเลตทิซในโครงสร้างผลึกและการเพิ่มขึ้นของโครงสร้างออร์โตรอมบิกซึ่งสอดคล้องกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสจากการวิเคราะห์ XRD [18]

ค่าคงที่โดยอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง (ϵ_r) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO มีค่าอยู่ในช่วง 1313-1761 (ตารางที่ 3) สำหรับค่าคงที่โดยอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ T_c (ϵ_c) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO พบว่าค่า ϵ_c เพิ่มขึ้นจาก 4854 เป็น 6745 เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1000°C เป็น 1025°C จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นสูงกว่า 1050°C การลดลงของค่าคงที่โดยอิเล็กทริกสามารถอธิบายได้จากการเกิดขึ้นของรูพรุนบริเวณรอยต่อเกรนซึ่งสอดคล้องกับรูปภาพ SEM ค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ Tr และ T_c แสดงดังตารางที่ 3



รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln(1/\varepsilon_r - 1/\varepsilon_m)$ กับ $\ln(T - T_c)$ ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C

ความกว้างของพีคไดอิเล็กทริกและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ขึ้นกับความถี่เป็นลักษณะเฉพาะของสมบัติรีแลกเซอร์เฟอร์โรไดอิเล็กทริก (relaxor ferroelectric) จากรูปที่ 5 เมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้น กราฟค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีความกว้างของพีคมากขึ้น สันนิฐานได้ว่าเกิดจากการแพร่เฟสและอิบาย ได้ตามกฎของคูรี-ไวส์ (Curie-Weiss) ดังแสดงในสมการที่ (4)

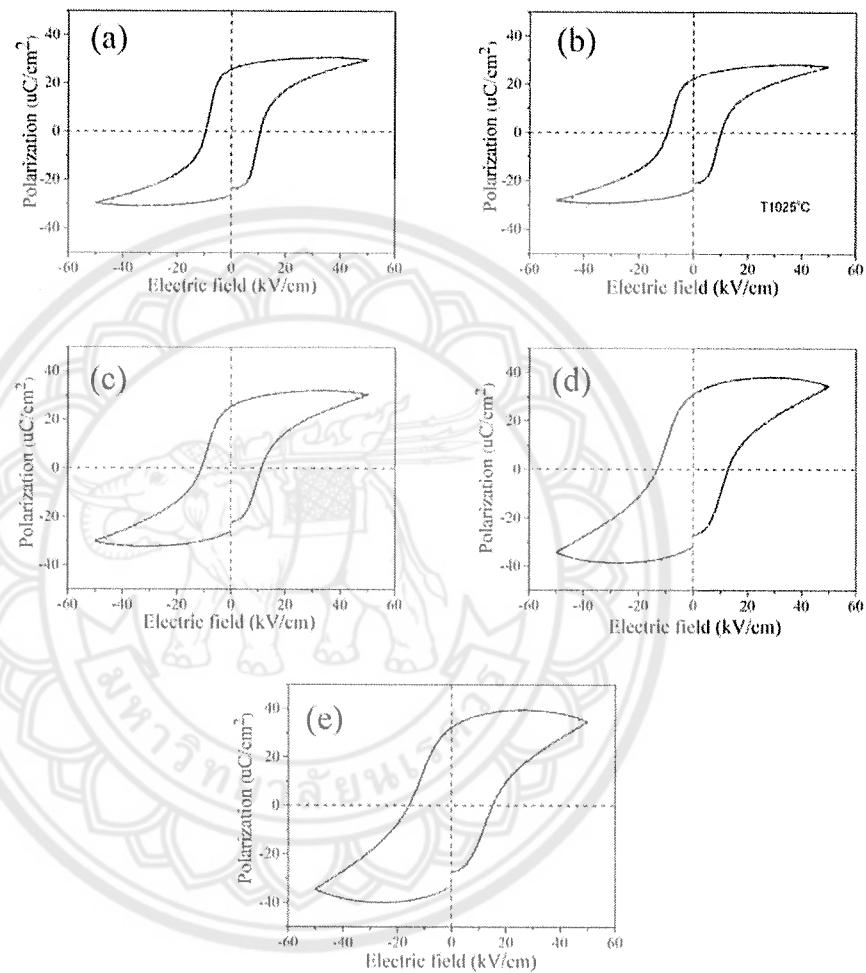
$$\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_c} = (T - T_c)^\gamma / C \quad (4)$$

เมื่อ γ คือค่าคงที่การแพร์, C คือค่าคงที่ และ ε_c คือค่าคงที่โดยอิเล็กทริกสูงสุดที่อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (T_c) โดยที่ค่า γ อยู่ระหว่าง 1 (พฤติกรรมเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติ) และ 2 (พฤติกรรมเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบบีแลกเซอร์) [19] รูปที่ 4 แสดงกราฟของ $\ln(1/\varepsilon - 1/\varepsilon_c)$ กับ $\ln(T - T_c)$ ที่ความถี่ 1 kHz ในทุกตัวอย่าง โดยที่ค่า γ หาได้จากค่าความชันของกราฟ $\ln(1/\varepsilon - 1/\varepsilon_c)$ กับ $\ln(T - T_c)$ จากการคำนวณพบว่าค่า γ ของเซรามิกมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิขึ้นเตอร์เพิ่มขึ้น (รูปที่ 5 (a)-(e)) ซึ่งอธิบายได้จากการเกิดความผันผวนและความไม่เป็นระเบียบของประจุภายในตำแหน่ง A-site ส่งผลให้เซรามิกแสดงพฤติกรรมเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบบีแลกเซอร์

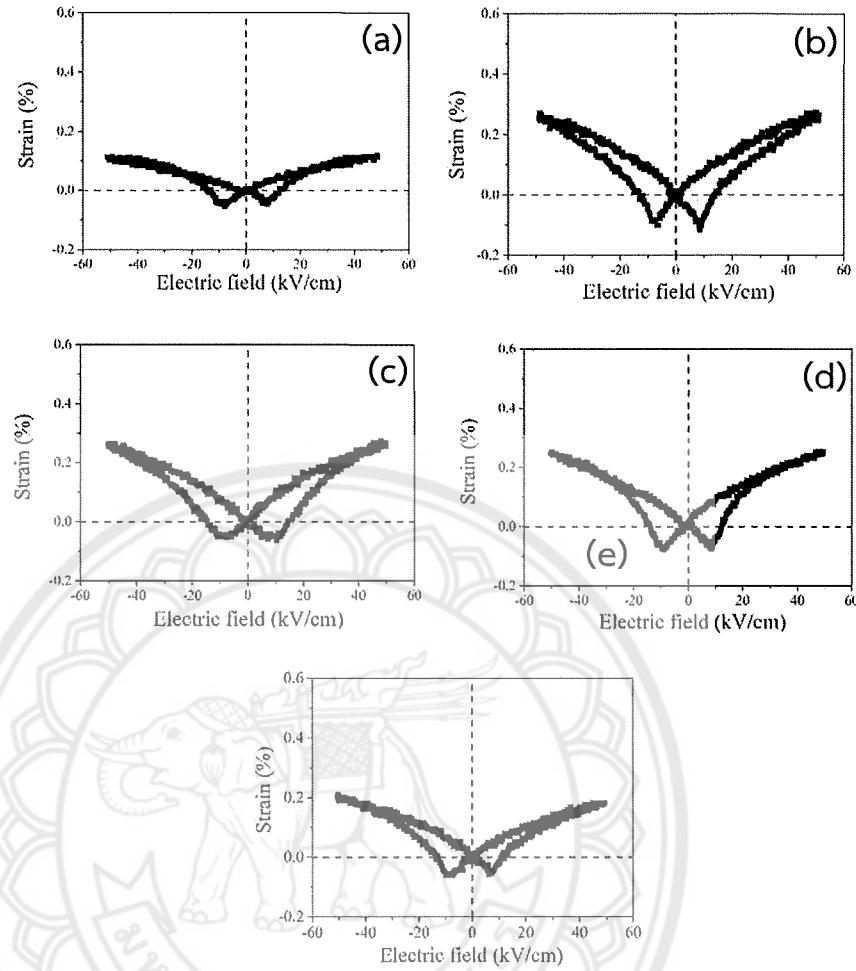


4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติเฟร่ออิเล็กทริกของเซรามิก

KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000°C – 1100°C



รูปที่ 6 วัสดุอิสเทอร์จิสของเซรามิก KNLNTS+0.3wt% Bi_2O_3 +0.4wt% Fe_2O_3 +0.2wt% CuO ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C



รูปที่ 7 วัสดุรูปปีกผีเสือของเซรามิก $\text{KNLNTS} + 0.3\text{wt\%}\text{Bi}_2\text{O}_3 + 0.4\text{wt\%}\text{Fe}_2\text{O}_3 + 0.2\text{wt\%}\text{CuO}$ ขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1000°C (b) 1025°C (c) 1050°C (d) 1075°C และ (e) 1100°C

ตารางที่ 4 สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก $\text{KNLNTS} + 0.3\text{wt\%}\text{Bi}_2\text{O}_3 + 0.4\text{wt\%}\text{Fe}_2\text{O}_3 + 0.2\text{wt\%}\text{CuO}$

อุณหภูมิขึ้นเตอร์ ($^\circ\text{C}$)	สภพชั่วคงค้าง (P_r) ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	สนามไฟฟ้าล้ำล่าง (E_c) (kV/cm)	ความเครียด (%)	d_{33}^* (pm/V)
1000	23.31	10.82	0.119	238
1025	20.78	10.16	0.274	548
1050	22.10	11.12	0.268	536
1075	26.95	12.89	0.253	506
1100	27.30	15.02	0.181	362

รูปที่ 6 แสดง wangwan ห้องสเทอเรอชิส P-E ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ภายใต้สนามไฟฟ้า 50 kV/cm พบร้าที่อุณหภูมิชินเตอร์ 1000°C-1050°C wangwan ห้องสเทอเรอชิส มีลักษณะอิ่มตัว เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1050°C wangwan ห้องสเทอเรอชิส มีลักษณะกว้าง และไม่อิ่มตัว ซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า [20] จากการวิเคราะห์ค่าสภาพขั้วคงค้างของโพลาไรเซชัน (remnant polarization; P_r) พบร้าค่า P_r มีค่าอยู่ในช่วง 20.78-27.30 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ สำหรับค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง (E_c) มีค่าลดลงจาก 10.82 เป็น 10.16 kV/cm เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1050°C แสดงดังตารางที่ 4 ที่อุณหภูมิชินเตอร์ 1025°C เซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4 wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO แสดงค่า P_r สูงเท่ากับ 20.78 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ และค่า E_c ต่ำสุดเท่ากับ 10.16 kV/cm ซึ่งอาจเป็นผลจากการเกิดบริเวณเฟสร่วม (Morphotropic phase boundary : MPB) ระหว่าง Amm2 และ P4bm และมีอัตราส่วนเป็น 46.38:53.62 มีโครงสร้างจุลภาคดีและมีความหนาแน่นสูง ทำให้ space charge บริเวณขอบเกรนลดลง เหนี่ยวนำให้ไดเมนเกิดการหมุนได้ง่าย [21] ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ค่า P_r สูง

wangwan รูปปีกฝีเสือ (electric field induce strain) ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000°C-1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้สนามไฟฟ้าในการวัด 50 kV/cm แสดงดังรูปที่ 7 (a)-(e) พบร้า wangwan รูปปีกฝีเสือของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO และลักษณะเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติ และลักษณะของ wangwan รูปปีกฝีเสือ มีลักษณะอิ่มตัวในทุกตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ค่าความเครียดและ d_{33}^* ของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นไปจนถึง 1025°C จากนั้นมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1025°C แสดงดังตารางที่ 4

บทที่ 5

บทสรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิชินเตอร์มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNTNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่ จากการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบร่วมกับเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบสมมรถระหว่างออร์โทромบิก และเททราโนนัลในทุกตัวอย่าง ศึกษาร้อยละของโครงสร้างโดยโปรแกรม fullprof พบว่าร้อยละของ Amm2 เพิ่มขึ้นในขณะที่ร้อยละของ P4bm ลดลง เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น ขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNLNTS+0.3wt%Bi₂O₃+0.4wt%Fe₂O₃+0.2wt%CuO เพิ่มจาก 4854 เป็น 6745 เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มจาก 1000°C เป็น 1025°C จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1025°C ที่อุณหภูมิชินเตอร์ 1025°C เซรามิกแสดงอัตราส่วนระหว่าง Amm2:P4bm เป็น 46.38:53.62 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม โครงสร้างจุลภาคที่ดี และความหนาแน่นสูงสุด (4.70 g/cm^3) ทำให้ตัวอย่างแสดงสมบัติทางไฟฟ้าสูง เช่น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง (ϵ at $T_r=1652$ และ ϵ at $T_m=6745$) สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกดี ($P_r=20.78 \mu\text{C/cm}^2$ และ $E_c=10.16 \text{ kV/cm}$) และค่าความเครียดสูง (0.274%)

បរវត្ថុក្រំ

- [1] B. Jaffe, W.R. Cook and H. Jaffe, *Piezoelectric Ceramics*. New York: Academic, 185-212 (1971).
- [2] E. Ringgaard and T. Wurlitzer, Lead-free piezoceramics based on alkali niobates. *J. Eur. Ceram. Soc.* 25 (2005) 2701.
- [3] R. Sumang, C. Wicheanrat, T. Bongkarn and S. Maensiri, High densification and dielectric properties of lead-free $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ piezoelectric ceramics with optimum excess Na_2O and K_2O contents. *Ceram. Int.* 41, S136-142 (2015).
- [4] E. Hollenstein, M. Davis, D. Damjanovic and N. Setter, Piezoelectric properties of Li- and Ta-modified $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ ceramics. *Appl. Phys. Lett.* 87, 182905-182910 (2005).
- [5] J. Wu, Y. Wang, D. Xiao, J. Zhu, P. Yu, L. Wu and W. Wu, Piezoelectric Properties of LiSbO₃-Modified $(K_{0.48}Na_{0.52})NbO_3$ Lead-Free Ceramics. *Jpn. J. Appl. Phys.* 46, 7375-7377 (2007).
- [6] H.L. Dua, F.S. Tang and D.J. Liu, The microstructure and ferroelectric properties of $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ -LiNbO₃ lead-free piezoelectric ceramics. *Mater. Sci. Eng. B* 136, 165-169 (2007).
- [7] L. Ramajo, R. Parra, M.A. Ramirez and M.S. Castro, Electrical and microstructural properties of CaTiO₃-doped $K_{1/2}Na_{1/2}NbO_3$ -lead free ceramics. *Bull. Mater. Sci.* 34, 1213-1217 (2011).
- [8] M. Kosec, V. Bobnar, M. Hrovat, J. Bernard, B. Malic and J. Holc, New lead-free relaxors based on the $K_{0.5}Na_{0.5}NbO_3$ -SrTiO₃ solid solution. *J. Mater. Res.* 19, 1849-1854 (2004).
- [9] K. Mathrmool, T. Udeye, A. Laowanidwatana, and T. Bongkarn. Low Temperature Fabrication of Lead-Free Piezoelectric KNLNTS Ceramics by the Solid State Combustion Technique. [PhD dissertation]. Naresuan University (2015)
- [10] S.H. Shin,C.MinRa and J.Yoo, Piezoelectric and dielectric properties of low temperature sintering $(Na_{0.52}K_{0.44}Li_{0.037})(Nb_{0.883}Sb_{0.08}Ta_{0.037})O_3$ ceramics substituted with $(Sr_{0.95}Ca_{0.05})TiO_3$. *Materials Lett.* 178, 166-170 (2016).
- [11] T. Takennaka, K. Maruyama and K. Sakata, $(Bi_{1/2}Na_{1/2})TiO_3$ -BaTiO₃ System for Lead-Free Piezoelectric Ceramics, *Jpn. J. Appl. Phys.* 30 (1991) 2236.
- [12] G.H.Haertling, “Ferroelectric ceramics: History and technology” , *J. Am. Ceram. Soc.*, 82(1999)797-818
- [13] J. M. Herbert, “Ceramics dielectric and capacitors” London: Gordon and Breach Scienec publishers, (1985).

- [14] สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์, “กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง” ใน เอกสาร ประกอบการสอน รายวิชา ว. วศ. 210443. เชียงใหม่: ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (1992)
- [15] K. C. Patil, S. T. Aruna, and T. Mirmani, “Combustion synthesis: an update” *Curr. Opin. Solid State Mater. Sci.*, 6(2002)507-512.
- [16] สุรินทร์ ลิ่มปนาท, และ ศรีไณ ชุนทด “เครื่องເອກົ່າເຮັດວຽກຂັ້ນ” ໃນ ເຄື່ອງມືວິຈິຫາງວັດຖ: ທຸກໆກີ່ງ ແລະການທຳການເບື້ອງຕົ້ນ. ກຽງເທິພາ: ສຳນັກພິມພົງພາລົງກຣົນມາວິທາລັກ. (2543)
- [17] ກຸ່າຍນ ສິວເລີສກມລ, “ກລັ້ອງຈຸລທຣສນອີເລັກຕຣອນແບນສ່ອງກຣາດແລະອຸປກຣນວິເຄຣະໜ້າຕຸຮັງສືເອກົ່າ” ໃນ ເຄື່ອງມືວິຈິຫາງວັດຖ: ທຸກໆກີ່ງແລະການທຳການເບື້ອງຕົ້ນ. ກຽງເທິພາ: ສຳນັກພິມພົງພາລົງກຣົນມາວິທາລັກ. (2545)
- [18] P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, N. Triamnuk, C.C. Huang, A. Ngamjarurojana, A. Ananta, D. P. Cann, R. Yimnirun, “Electrical conductivity and dielectric chromium doped lead zirconate titanate ceramic” *Ferroelectrics*, 382(1) (2009) 49-55.
- [19] C. Ciomaga, M. Viviani, M.T. Buscaglia, V. Buscaglia, L. Mitoseriu, A. Stancu, P. Nanni “Preparation and characterization of the Ba(Zr,Ti)O₃ ceramics with relaxor properties”. *J Eur Ceram soc*, 27(2007) 4061.
- [20] Chen, K., Xu, G., Yang, D., Wang, X., & Li, J. Dielectric and piezoelectric properties of lead-free 0.95(K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃-0.005LiNbO₃ crystals grown by the Bridgman method. *J Appl Phys*, 101, (2007) 044103.
- [21] Wei YX, Jin CG, Zeng YM, Wang XT , Xu G, Wang XL. Polar order evolutions near The rhombohedral to pseudocubic and tetragonal to pseudocubic phase boundaries of the BiFeO₃-BaTiO₃ system. *Materials*. 2015;8:8355-65.